WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6:

H01J 37/28, 37/244

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

WO 99/46797

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:

16. September 1999 (16.09.99)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP99/01544

A1

(22) Internationales Anmeldedatum:

10. März 1999 (10.03.99)

(30) Prioritätsdaten:

198 10 301.8 198 45 329.9 10. März 1998 (10.03.98) 1. Oktober 1998 (01.10.98) DE DE

(71)(72) Anmelder und Erfinder: ESSERS, Erik [DE/DE]; Lachnerstrasse 6, D-76131 Karlsruhe (DE).

(74) Anwalt: HERTZ, Oliver; v. Bezold & Sozien, Brienner Strasse 52, D-80333 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: JP, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

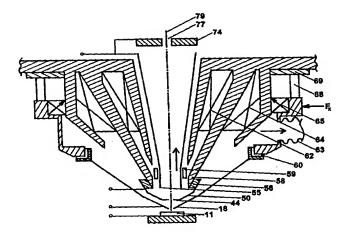
Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist; Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.

(54) Title: SCANNING ELECTRON MICROSCOPE

(54) Bezeichnung: RASTERELEKTRONENMIKROSKOP

(57) Abstract

The invention relates to a scanning electron microscope, comprising a electron gun and a sampling chamber in which one or several pressure stage diaphragms are arranged, through which a primary electron beam can be directed to a sample in the sampling chamber. The lowest pressure stage diaphragm (18) closest to the sample, through which the primary electron beam hits the sample, is designed to shield off increased pressure in the sampling chamber in relation to the remaining microscope column of the scanning electron microscope and to allow the passage of secondary electrons through its orifice from the sample to at least one detector. The detector is a highly sensitive detector (74) which is positively prestressed in relation to the sample. At least one electrode (44, 55) can be mounted above the lowest pressure stage diaphragm (18), on which a positive potential is applied in relation to the pressure stage diaphragm (18) and which is designed to direct the secondary electrons from the sample to the detector (74). Alternatively,



the scanning electron microscope is designed to detect the secondary electron through the orifice of at least one pressure stage diaphragm which has a layered structure consisting of at least two conductive, electrically insulated layers that may be impinged upon by potentials.

(57) Zusammenfassung

Bei einem Rasterelektronenmikroskop mit einem Strahlerzeuger und einer Probenkammer, zwischen denen eine oder mehrere Druckstufenblenden angeordnet sind, durch die ein Primärelektronenstrahl auf eine Probe in der Probenkammer lenkbar ist, wobei die der Probe nächste, unterste Druckstufenblende (18), durch die der Primärelektronenstrahl auf die Probe trifft, dazu eingerichtet ist, einen erhöhten Druck in der Probenkammer gegenüber der übrigen Mikroskopsäule des Rasterelektronenmikroskops abzuschirmen und durch ihre Öffnung Sekundärelektronen von der Probe zu mindestens einem Detektor durchzulassen, ist der Detektor ein hochempfindlicher, gegenüber der Probe positiv vorgespannter Detektor (74). Oberhalb der untersten Druckstufenblende (18) kann mindestens eine Elektrode (44, 55) angeordnet sein, die gegenüber der Druckstufenblende (18) auf positivem Potential liegt und dazu eingerichtet ist, die Sekundärelektronen von der Probe zum Detektor (74) zu lenken. Alternativ ist das Rasterelektronenmikroskop zur Sekundärelektronendetektion durch die Öffnung mindestens einer Druckstufenblende eingerichtet, die schichtweise aus mindestens zwei leitfähigen, voneinander elektrisch isolierten mit Potentialen beaufschlagbaren Schichten aufgebaut ist.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
ВВ	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
ВJ	Benin	ΙE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	$\mathbf{U}\mathbf{G}$	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko		Amerika
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	$\mathbf{U}\mathbf{Z}$	Usbekistan
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neuseeland	$\mathbf{z}\mathbf{w}$	Zimbabwe
CM	Kamerun		Korea	PL	Polen		
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
EE	Estland	LR	Liberia	$\mathbf{s}\mathbf{G}$	Singapur		

Rasterelektronenmikroskop

Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Rasterelektronenmikroskop (REM), insbesondere ein unter etwas erhöhtem Druck arbeitendes Rasterelektronenmikroskop oder die Umrüstung eines unter Vakuum betriebenen Rasterelektronenmikroskops für den Betrieb mit Gas in der Probenkammer, und bezieht sich insbesondere auf eine verbesserte Detektionseffizienz eines derartigen Mikroskops (d.h. auf die Verbesserung des Signal-zu-Rausch-Verhältnis der damit aufgenommenen Bilder), insbesondere beim Betrieb mit niedriger Primärenergie.

Bei einem Rasterelektronenmikroskop, das unter etwas erhöhtem Druck arbeitet (Druck-REM), ist in der Probenkammer üblicherweise ein maximaler Betriebsdruck von einigen Hektopascal bis einigen Kilopascal zugelassen. Die Primärelektronen haben bei diesem Druck nur eine kurze mittlere freie Weglänge. Deshalb wird die Mikroskopsäule zur Probenkammer hin durch eine Druckstufenblende (oder druckbegrenzende Blende) abgeschlossen, durch die der Primärelektronenstrahl in die Probenkammer eintritt. Oberhalb dieser Druckstufenblende ist der Druck um mehrere Zehnerpotenzen verringert.

Mit einer Szintillator-Lichtleiter-Kombination, die zwischen der Probe und der Druckstufenblende angeordnet ist, können die von der Probe emittierten Rückstreuelektronen detektiert werden. Eine demgegenüber verbesserte Ortsauflösung erhält man bei der Verwendung der von der Probe emittierten Sekundärelektronen, die mit Hilfe einer Kollektorelektrode detektiert werden können (WO 88/09564 A1). Dabei ist üblicherweise die Unterseite der Druckstufenblende als Kollektorelektrode ausgebildet oder eine separate Kollektorelektrode unterhalb der Druckstufenblende angeordnet.

Bei anderen Rasterelektronenmikroskopen, die unter etwas erhöhtem Druck arbeiten, findet die Detektion der Sekundärelektronen durch die Öffnung der Druckstufenblende hindurch in einer Art Vorkammer statt, die nach oben zur Objektivlinse hin durch eine weitere Druckstufenblende abgeschlossen ist. Als Detektor für die Sekundärelektronen wird auch hier eine Kollektorelektrode verwendet (WO 90/04261 A1). Diese Gestaltung wurde zwar erprobt (G. D. Danilatos,,,Design and Construction of an Environmental SEM; Part 4",Scanning Vol.12 (1990), S. 23), hat sich jedoch in der praktischen Anwendung nicht durchgesetzt.

Detektorsysteme mit Kollektorelektroden haben wegen des Rauschens bei der nachfolgenden elektronischen Verstärkung eine schlechte Nachweisempfindlichkeit und erfordern deshalb eine Vorverstärkung des Sekundärelektronensignals vor dem Erreichen der Kollektorelektrode. Diese

Vorverstärkung erfolgt mit Hilfe eines elektrischen Feldes zwischen der Probe und der Kollektorelektrode, durch das die von der Probe emittierten Sekundärelektronen beschleunigt werden, so daß
sie Gasmoleküle ionisieren können. Nach dem Stoß mit den Gasmolekülen werden die dabei im Gas
erzeugten Sekundärelektronen und die bereits vorher vorhandenen Sekundärelektronen wieder durch
das elektrische Feld beschleunigt und erzeugen weitere Sekundärelektronen im Gas. Auf diese Weise wird durch die von der Probe emittierten Sekundärelektronen eine Sekundärelektronenkaskade
ausgelöst, die schließlich die Kollektorelektrode erreicht. Auch bei Verwendung eines Lichtleiters
mit nachgeschaltetem Photomultiplier als Gasszintillationsdetektor wird eine Sekundärelektronenkaskade als Vorverstärkung verwendet.

Trotz dieser Kaskaden-Vorverstärkung ist in beiden Fällen das Signal-zu-Rausch-Verhältnis der bei etwas erhöhtem Druck aufgenommenen Bilder, bei gleicher Strahlstromstärke wesentlich schlechter als bei den Bildern, die ohne erhöhten Druck mit konventionellen Sekundärelektronendetektoren aufgenommen werden. Insbesondere für die Untersuchung empfindlicher Proben (beispielsweise Halbleiterbauelemente, Kunststoffe, biologische und medizinische Proben) stellt deshalb die Verbesserung der Detektionseffizienz und die Verringerung des Detektor-Rauschens der Druck-REMs eine wichtige Aufgabe dar.

Bei der Untersuchung empfindlicher Proben ist weiterhin die Verwendung einer niedrigen Primärenergie vorteilhaft, um der Probe weniger Energie zuzuführen und um die Schädigung der Probe durch den Elektronenstrahl auf eine dünne Oberflächenschicht zu begrenzen. Die bisher bekannten Druck-REMs benötigen für ihre Kollektorelektrode eine Sekundärelektronenkaskade im Gas und sind deshalb für den Betrieb mit niedriger Primärenergie (von beispielsweise 1 keV), insbesondere bei der Beobachtung feuchter Proben, ungeeignet. Für den Betrieb mit niedriger Primärenergie sind nämlich eine möglichst kurze Gasstrecke zwischen der Probe und der darüberliegenden Druckstufenblende, sowie ein möglichst geringer Druck oberhalb der Druckstufenblende erforderlich, da mit abnehmender Primärenergie auch die mittlere freie Weglänge der Primärelektronen im Gas abnimmt. Unter diesen Bedingungen ist jedoch keine befriedigende Kaskaden-Vorverstärkung mehr möglich, so daß die bisher bekannten Druck-REMs beim Betrieb mit Gas in der Probenkammer zur Beobachtung feuchter Proben erst ab einer Primärenergie von 3 keV verwendet werden können. Aber auch bei 3 keV wird durch den hohen Anteil an gestreuten Primärelektronen ein Signal-Untergrund erzeugt, der dazu führt, daß die Bilder ein noch wesentlich schlechteres Signal-zu-Rausch-Verhältnis aufweisen als bei hoher Primärenergie. Dasselbe gilt auch für den Betrieb mit niedriger Primärenergie (von beispielsweise 1,5 keV), der bei den bisher bekannten Druck-REMs bei einem Druck bis zu etwa 1,5 hPa zu Zwecken der Aufladungsbekämpfung verwendet wird.

Durch die schlechte Detektionseffizienz und bei der Verwendung einer Kollektorelektrode

auch durch die Zeitkonstante des Operationsverstärkers sind die heutigen Druck-REMs außerdem für geringe Strahlstromstärken nicht gut geeignet. Insbesondere bei der Untersuchung feuchter Proben bei hoher Vergrößerung wären eine geringere Strahlstromstärke und eine geringere Primärenergie jedoch wichtig, um eine lokale Erwärmung und das damit verbundene Austrocknen der betrachteten Probenstelle zu vermeiden.

Weiterhin besteht der Bedarf nach einem Druck-REM mit gutem Signal-zu-Rausch-Verhältnis, das auch für niedrige Primärenergie geeignet ist, auch, um feine Oberflächenstrukturen leichter Elemente besser wiedergeben zu können und den Kanteneffekt zu vermeiden.

Die Aufladungsbekämpfung beim Betrieb mit niedriger Primärenergie stellt eine weitere wichtige Aufgabe dar, die von den heutigen Druck-REMs wegen des dabei erhaltenen schlechten Signal-zu-Rausch-Verhältnis nicht zufriedenstellend gelöst wird. Anwendungsmöglichkeiten für entsprechende Druck-REMs bestehen beispielsweise in der Abbildung empfindlicher Kunststoffe, in der Elektronenstrahllithographie und bei Metrologiegeräten, wie sie beispielsweise in der Halbleiterindustrie zur automatisierten Überwachung in der Produktion verwendet werden. Statt dessen wird heute in anderen Metrologiegeräten der Einfluß der Aufladungen verringert, indem Rückstreuelektronen für die Abbildung verwendet werden.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein verbessertes, unter etwas erhöhtem Druck arbeitendes REM (im folgenden: Druck-Rasterelektronenmikroskop oder Druck-REM) anzugeben, das die genannten Nachteile herkömmlicher Druck-REMs nicht aufweist, und insbesondere die Detektionseffizienz von Druck-REMs, bei denen die Detektion durch die Druckstufenblende stattfindet, durch die Mikroskopsäule zur Probenkammer hin abgeschlossen ist (bzw. das Signal-zu-Rausch-Verhältnis der damit aufgenommenen Bilder), insbesondere beim Betrieb mit niedriger Primärenergie zu verbessern.

Diese Aufgabe wird durch ein REM mit den Merkmalen gemäß Patentanspruch 1 und/oder Patentanspruch 3 gelöst. Vorteilhafte Ausführungsformen der Erfindung ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen.

Der Erfindung liegt allgemein die Idee zugrunde, ein Rasterelektronenmikroskop mit den Merkmalen gemäß dem Oberbegriff von Patentanspruch 1 so weiterzubilden, daß als Detektor ein hochempfindlicher, gegenüber der Probe positiv vorgespannter Detektor verwendet wird.

Erfindungsgemäß wird die Aufgabe insbesondere gemäß einem ersten Gesichtspunkt ferner insbesondere dadurch gelöst, daß oberhalb der Druckstufenblende ein oder mehrere Elektrodenelemente (massive Elektroden oder dünne Elektrodenschichten) angeordnet sind, die gegenüber der Druckstufenblende auf positivem Potential liegen, wobei als Detektor für die in der Probe und im Gas erzeugten Sekundärelektronen keine Kollektorelektrode, sondern ein oder mehrere Detektoren mit höherer Nachweisempfindlichkeit verwendet werden.

3

Der Vorteil der Erfindung besteht insbesondere darin, daß - unabhängig von dem Vorhandensein einer Sekundärelektronenkaskade - eine hohe Detektionseffizienz für die von der Probe emittierten Sekundärelektronen und ein geringes Rauschen des Detektorsystems erzielt werden. Bei den erfindungsgemäßen Druck-REMs kann die Länge der Wegstrecke, die die Primärelektronen durch das Gas zurücklegen müssen. sehr klein (< 300 µm) gemacht werden, indem ein kurzer Abstand zwischen der Probe und der Druckstufenblende verwendet wird und oberhalb der Druckstufenblende stark abgepumpt wird. Die bisher bekannten Druck-REMs sind für solche kurzen Wegstrecken (< 300 µm) der Primärelektronen durch das Gas hingegen prinzipiell ungeeignet, weil sich dabei weder unterhalb noch oberhalb der Druckstufenblende eine ausreichende Sekundärelektronenkaskade ausbilden kann.

Mit der guten Eignung für eine kurze Wegstrecke der Primärelektronen durch das Gas werden durch die erfindungsgemäßen Druck-REMs insbesondere zwei wichtige neue Anwendungsgebiete für Druck-REMs erschlossen und die Eigenschaften bereits bekannter Anwendungen werden verbessert.

Als neues Anwendungsgebiet wird erstens die Rasterelektronenmikroskopie bei geringer Primärenergie (beispielsweise 1 keV und weniger) mit Gas in der Probenkammer (beispielsweise Wasserdampf bei einem Druck von 10 hPa) problemlos möglich. Wegen der hohen Detektionseffizienz und des geringen Rauschens des Detektorsystems ist dabei nur eine geringe Strahlstromstärke erforderlich. Hiermit können feuchte Proben bei höheren Vergrößerungen als bisher ohne Austrocknen der betrachteten Probenstelle beobachtet werden. Außerdem stellt auch die Aufladungsbekämpfung beim Betrieb mit niedriger Primärenergie und guter Detektionseffizienz eine wichtige Verbesserung der bisherigen Möglichkeiten dar.

Zweitens wird durch die erfindungsgemäßen Druck-REMs bei hoher Primärenergie (> 15 keV)Rasterelektronenmikroskopie mit Sekundärelektronen bei ungewöhnlich hohem Druck (> 100 hPa) möglich. Bei Verwendung einer Druckstufenblende mit sehr kleinem Bohrungsdurchmesser (von beispielsweise 20 μ m) ist, bei extrem kleinen Abständen (< 50 μ m) zwischen der Probe und der Druckstufenblende, sogar der Betrieb bei Umgebungsdruck (1013 hPa) möglich.

Außerdem kann insbesondere bei niedriger Primärenergie mit Hilfe bestimmter Gase (beispielsweise Sauerstoff oder sauerstoffhaltige Verbindungen) der Probenkontamination entgegengewirkt werden, die bei niedriger Primärenergie ein Problem in der Rasterelektronenmikroskopie darstellt. (Eine wirkungsvolle Reinigung der Probe vor der Untersuchung in REMs kann erreicht werden, wenn in die Schleuse ein Hochfrequenzplasmareinigungsgerät integriert wird.)

Eine weitere Verbesserung der Detektionseffizienz von Druck-REMs, bei denen die Detektion der Sekundärelektronen durch eine oder mehrere Druckstufenblenden hindurch stattfindet, erreicht man gemäß einem zweiten Gesichtspunkt der Erfindung insbesondere durch die Vergrößerung

des Anteils der Sekundärelektronen, die durch die Druckstufenblenden hindurch gelangen. Dieser Anteil kann vergrößert werden, indem mindestens eine Druckstufenblende schichtweise aufgebaut wird aus zwei oder mehr leitfähigen Schichten mit dazwischenliegenden, schlecht leitenden oder isolierenden Schichten, so daß die Unterseite und die Oberseite der Druckstufenblende auf verschiedene Potentiale gelegt werden können. Dadurch wird in der Bohrung der Druckstufenblende ein elektrisches Feld erzeugt, das den Transport der Sekundärelektronen verbessert.

Die oben genannten ersten und zweiten Gesichtspunkte der Erfindung können einzeln oder gemeinsam implementiert werden, um die oben aufgeführte Aufgabe zu lösen. In beiden Fällen wird die Beschleunigung von Sekundärelektronen aus einem probennahen Bereich mit erhöhtem Druck hin zum Detektor in einen probenfernen Bereich mit reduziertem Druck (Vakuum) unterstützt.

Bei den üblichen Sekundärelektronendetektoren mit hoher Nachweisempfindlichkeit löst jedes einzelne Sekundärelektron eine große Anzahl Photonen, Elektronen oder Elektron-Loch-Paare aus, die dann detektiert werden. Hierzu ist es erforderlich, daß den Sekundärelektronen vor dem Erreichen des Detektors oder (bei Channelplate und Channeltron) entlang der Detektoroberfläche Energie zugeführt wird. Zu diesem Zweck muß zwischen der Probe und dem Detektor bzw. (bei Channelplate und Channeltron) entlang der Detektoroberfläche eine große elektrische Spannung angelegt werden.

Eine bevorzugte Ausführungsform der Erfindung besteht deshalb darin, daß die gesamte Detektoroberfläche oder Teile der Detektoroberfläche auf einem Potential liegen, das gegenüber dem Potential der Probe um mehr als 500 V, vorzugsweise 1000 V positiv ist. Die Verwendung solcher Detektoren in der Probenkammer eines herkömmlichen Druck-REMs würde zu Überschlägen führen.

Eine bevorzugte Ausführungsform der Erfindung besteht darin, daß das Druck-REM eine kombinierte elektrostatische und magnetische Objektivlinse besitzt. Gegenüber der einfacher herstellbaren rein elektrostatischen Objektivlinse (DE 3703029 A1) ist dies insbesondere dann von Vorteil, wenn das so ausgestaltete Druck-REM auch beiden üblichen Primärenergien oberhalb von 3 keV eingesetzt werden soll. Verglichen mit einer rein magnetischen Objektivlinse, ist eine kombinierte elektrostatische und magnetische Objektivlinse insbesondere dann von Vorteil, wenn die Sekundärelektronen durch ein elektrisches Feld auf die Öffnung einer Druckstufenblende fokussiert werden sollen. Insbesondere für die Untersuchung nichtmagnetischer Proben ergeben Ausführungsformen mit einer magnetischen Einpollinse (beispielsweise entsprechend den Objektivlinsen in EP 0790634 A1, DE 4236273 A1, EP 0767482A2 und EP 0817235 A1) eine besonders gute Auflösung und eine besonders gute Detektionseffizienz als wichtige Vorteile.

Die verbesserte Detektionseffizienz kommt durch eine Vergrößerung des Anteils der in der Probe und im Gas erzeugten Sekundärelektronen zustande, die durch die Druckstufenblenden hin-

5

durch zum Detektor gelangen. Bei Verwendung einer magnetischen Einpollinse wird dieser Anteil vergrößert, weil die Sekundärelektronen sich auf Spiralbahnen um die magnetischen Feldlinien bewegen, die durch die Öffnungen der Druckstufenblenden hindurchgehen. Im Gas der Probenkammer werden die Sekundärelektronen zwar durch Stöße auf neue Spiralbahnen um benachbarte Feldlinien gebracht, die bei ausreichender magnetischer Feldstärke meistens jedoch ebenfalls durch die Öffnungen der Druckstufenblenden hindurchgehen.

Die Realisierung der Erfindung ist nicht auf Druck-REMs beschränkt, sondern kann durch Umrüstung auch bei REMs erfolgen, die normalerweise mit evakuierter Probenkammer betrieben werden. Die leichte Umrüstbarkeit zwischen den beiden Anwendungsfällen stellt einen Vorteil der Erfindung dar.

Weitere Ausführungsformen und Vorteile der Erfindung werden aus den beibefügten Zeichnungen und ihrer Beschreibung ersichtlich. Es zeigen:

- Fig.1 eine schematische Darstellung einer erfindungsgemäßen Anordnung von Druckstufenblenden, Objektivlinse, Elektroden und Detektor für ein Druck-REM,
- Fig.2 einen Ausschnitt aus Fig. 1, in dem die Druckstufenblenden dargestellt sind,
- Fig.3 analog zu Fig. 2 eine schematische Darstellung mit einer schichtweise aufgebauten Druckstufenblende,
- Fig.4 für einen etwas größeren Ausschnitt als in Fig. 2 eine schematische Darstellung einer weiteren Variante eines erfindungsgemäßen Druck-REMs, insbesondere mit einer modifizierten Befestigung der oberen Druckstufenblende,
- Fig. 5 eine schematische Darstellung eines etwas größeren Ausschnitts als in Fig. 2 für eine weitere Variante eines erfindungsgemäßen Druck-REMs mit einer schichtweise aufgebauten oberen Druckstufenblende, die zusätzliche Öffnungen für den Durchtritt von Sekundärelektronen aufweist,
- Fig.6 eine schematische Darstellung eines Ausführungsbeispiels mit einer rein magnetischen Objektivlinse,
- Fig.7 eine schematische Darstellung eines weiteren Ausführungsbeispiels mit einer rein magnetischen Objektivlinse,
- Fig.8 eine schematische Darstellung einer Erweiterung des Ausführungsbeispiels aus Fig. 1 mit einem zusätzlichen oberen Detektor, und
- Fig.9 eine Abwandlung des Ausführungsbeispiels aus Fig. 8 mit einer anderen Variante des zusätzlichen oberen Detektors.

Die Darstellungen in den Figuren beschränken sich auf die zum Verständnis der Erfindung wichtigen Komponenten im Bereich zwischen der Probe und dem Detektor. Die übrigen Teile eines Ra-

sterelektronenmikroskops, zu denen beispielsweise Gehäusewände. Vakuumpumpen, Vakuumleitungen, die Kathode, die Elektroden zur Strahlformung, die Kondensorlinse, die Aperturblende, die Stigmatoren, die Alignment-Spulen und Steuereinrichtungen zählen, sind nicht dargestellt. So zeigt insbesondere Fig. 1 für ein Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Druck-REMs die für das Verständnis der Erfindung wesentlichen Bestandteile.

Der Primärelektronenstrahl gelangt längs der optischen Achse 79 von oben durch die Öffnung 77 des Detektors 74. Die zum Abrastern der Probe 11 erforderliche Ablenkung des Primärelektronenstrahles wird mit Hilfe der Ablenkspulen 59 erzeugt. Die Fokussierung des Primärelektronenstrahles geschieht mit Hilfe der von den Elektroden 44, 50 und 55 gebildeten elektrostatischen Linse und des von der magnetischen Linse 62 und/oder von der magnetischen Einpollinse 64 erzeugten Magnetfeldes. Einen weiteren Beitrag zur Fokussierung des Primärelektronenstrahles liefert das elektrische Feld zwischen der Elektrode 44 und der Elektrode 18. Es ist auch möglich, die magnetische Linse 62 mit zur optischen Achse hin geöffnetem Polschuhspalt oder die magnetische Einpollinse 64 wegzulassen.

Die Elektrode 55 liegt gegenüber den Elektroden 44 und 50 auf stark positivem Potential. Die Potentialdifferenz beträgt bevorzugt 1 bis 15 kV und kann beispielsweise 7 keV betragen. Die Elektroden 50 und 44 sind über die Isolierung 56 am Polschuh 58 zentriert. Die Elektrode 44 liegt gegenüber der Elektrode 18 auf positivem Potential mit einer bevorzugten Potentialdifferenz von 50 bis 2000 V. Die Elektrode 18, die über die Isolierung 60 befestigt ist, liegt gegenüber der Probe 11 auf positivem oder auf demselben Potential. Die Größe der angelegten Spannungen wird weiter unten in Zusammenhang mit Fig. 2 besprochen.

Da die beiden Elektroden 18 und 44 eine elektrostatische Linse bilden, ist es für die Auflösung vorteilhaft, daß die kegelstumpfförmige Elektrode 18 während des Betriebes mit großer Genauigkeit in Bezug auf die optische Achse 79 zentriert werden kann. Eine geeignete Möglichkeit hierfür besteht beispielsweise in der Verwendung von Mikrometerschrauben und/oder geregelten Piezostellsystemen, deren Krafteinwirkungen F_X und F_Y (in x- und y-Richtung) im dargestellten Ausführungsbeispiel die über den Umfang verteilten Rundstäbe 68 elastisch verformen. Die Elektrode 44 muß nicht so genau zentrierbar sein wie die Elektrode 18, da die Äquipotentialflächen des elektrischen Feldes im Bereich der Öffnung41 der Elektrode 44 nahezu eben sind.

Die Elektroden 18 und 44 sind gleichzeitig als Druckstufenblenden ausgebildet. Durch die Öffnung der Druckstufenblende 18 strömt Gas aus der Probenkammer nach oben in die Mikroskopsäule, das durch den Wellschlauch 63 und durch die Öffnung der Elektrode 55 abgepumpt wird, wie es die Pfeile andeuten. Die Abdichtung der zentrierbaren Druckstufenblende 18 gegenüber dem äußeren Polschuh erfolgt durch den Simmerring 65.

Bei der in Fig. 1 dargestellten Ausführung können diejenigen Bauteile (18, 44, 50, 56, 60,

63, 65, 68, 69), die beim Betrieb mit Vakuum in der Probenkammer eine unnötige Begrenzung für das Blickfeld und den Arbeitsabstand darstellen, leicht ausgebaut werden, um das Druck-REM im Vakuumbetrieb ohne sie mit einer anderen Elektrode 50 zu betreiben. Zu diesem Zweck kann das Bauteil 69 von dem darüberliegenden Teil losgeschraubt werden und ist die Isolierung 56 leicht demontierbar am Polschuh 58 befestigt. Weiterhin ist die Druckstufenblende 18 leicht auswechselbar, so daß je nach Anwendungsfall Druckstufenblenden mit unterschiedlich großen Öffnungen verwendet werden können.

Ein vergrößerter Ausschnitt aus Fig. 1 mit den Druckstufenblenden 18 und 44 und der Probe 11 ist in Fig. 2 schematisch dargestellt. Die Elektrode 44 liegt gegenüber der Elektrode 18 auf positivem Potential, dessen Größe so gewählt ist, daß direkt oberhalb und direkt unterhalb der Öffnung 41 etwa dieselbe elektrische Feldstärke herrscht. Hierdurch wird erreicht, daß die Krümmung der Äquipotentialflächen im Bereich der Öffnung 41 möglichst schwach ist. Außerdem ist die obere Druckstufenblende 44 sehr dünn. um eine möglichst geringe Krümmung der Äquipotentialflächen in der Nähe der optischen Achse hervorzurufen. Ihre bevorzugte Dicke in der Nähe der optischen Achse ist kleiner als 300 μm und größer als 0,4μm (z.B. 20 μm). Sie kann entweder aus Metall bestehen (beispielsweise als Dünnschichtblende, die bei Bedarf auch mit dem Primärelektronenstrahl beheizt werden kann) oder kann durch Ätzen insbesondere aus Halbleitermaterial (beispielsweise Silizium) hergestellt werden. Im letztgenannten Fall kann beim Ätzen entweder eine dünne Schicht des Halbleiters stehen gelassen werden oder nur eine Metallschicht übriggelassen werden, die vorher auf den Halbleiter aufgebracht wurde.

Die bevorzugte Größe der Öffnungen 16 und 41 der Druckstufenblenden in Fig. 2 ist abhängig vom gewünschten maximal zulässigen Druck in der Probenkammer, von der gewünschten kleinsten verwendbaren Primärenergie, von der Spannung und dem Abstand zwischen den Elektroden 18 und 44 und von der Güte des Vakuums, das die Kathode (beispielsweise ein Schottky-Emitter) benötigt. Der Durchmesser der Öffnung 16 der Druckstufenblende 18 kann beispielsweise 20 μm bis 500 μm betragen. Bei Verzicht auf die Eignung für niedrige Primärenergien oder bei Beschränkung auf niedrige Drücke in der Probenkammer, kann die Größe der Öffnung 16 aber beispielsweise auch 1000 μm betragen. Der bevorzugte Durchmesser der Öffnung 41 kann beispielsweise100 μm bis 2000 μm betragen. Er ist vorzugsweise mindestens so groß wie der Durchmesser der Öffnung 16.

Bei Verwendung von Halbleitermaterial für die Druckstufenblende 18, kann sie gleichzeitig auch als Halbleiterdetektor für Rückstreuelektronen ausgestaltet werden. Eine Möglichkeit hierfür besteht darin, daß die Unterseite 14 und der untere Bereich der Außenseite 15 der Druckstufenblende n-dotiert und mit einer dünnen Metallschicht bedampft werden, so daß sich ein Schottky-Kontakt ausbildet.

Der Primärelektronenstrahl tritt in Fig. 2 von oben durch die Öffnung 16 in die Probenkam-

mer ein, durchquert das Gas in der Probenkammer und trifft auf die Probe 11, wo er Sekundärelektronen und Rückstreuelektronen erzeugt. Die Sekundärelektronen haben einen großen Wirkungsquerschnitt für elastische Streuung. Ihre Bewegungsrichtung wird deshalb, ähnlich wie bei einem Diffusionsvorgang, häufig umgelenkt und es besteht die Gefahr, daß sie von der Probe absorbiert werden. Die Sekundärelektronen werden deshalb mit Hilfe eines elektrischen Feldes zur Öffnung 16 gelenkt, das entweder nur aus dem Felddurchgriff durch die Öffnung 16 besteht oder durch das zusätzliche Anlegen einer Spannung zwischen der Probe 11 und der Druckstufenblende 18 erzeugt wird.

In Abhängigkeit vom Gas und Druck in der Probenkammer, Durchmesser der Öffnung 16, Länge der Bohrungswandung 17, Kegelöffnungswinkel β und γ der inneren Kegelfläche 22 und Abstand zwischen der Probe 11 und der Druckstufenblende 18 gibt es jeweils eine optimale Spannung zwischen der Probe 11 und der Druckstufenblende 18, für die die meisten Sekundärelektronen zum Detektor 74 gelangen. Diese Spannung kann zwischen null Volt und einigen hundert Volt liegen. Für kleine Abstände zwischen der Probe 11 und der Druckstufenblende 18 kann der Felddurchgriff durch die Öffnung 16 der Druckstufenblende (in Abhängigkeit von den oben genannten Parametern)ausreichend groß sein, um die Sekundärelektronen zur Öffnung 16 zu lenken. Dann können die Probe11 und die Druckstufenblende 18 auf demselben Potential liegen.

Das Anlegen einer Spannung zwischen der Probe 11 und der Druckstufenblende 18 hat mehrere Auswirkungen: Es erzeugt ein stärkeres elektrisches Feld und verbessert dadurch den Transport der Sekundärelektronen nach oben zur Druckstufenblende 18. Gleichzeitig verringert es die Durchwölbung der Äquipotentialflächen nach unten innerhalb und direkt unterhalb der Öffnung 16, so daß die Sekundärelektronen in diesem Bereich weniger stark zur optischen Achse 79 hin gelenkt werden. Andererseits bewirkt es jedoch zusammen mit der kegelstumpfförmigen Elektrode 18, daß die Sekundärelektronen weiter unterhalb der Öffnung 16 zur optischen Achse 79 hin gelenkt werden.

Für eine nicht zu große Bohrungslänge der Öffnung 16 und kleine Abstände zwischen der Probe 11 und der Druckstufenblende 18 (je nach Druck in der Probenkammer und Geometrie der Druckstufenblende 18 beispielsweise für Abstände bis zum doppelten Durchmesser der Öffnung 16) gelangt ein Großteil der Sekundärelektronen auch durch die Öffnung 16, wenn die Spannung zwischen der Probe 11 und der Druckstufenblende 18 so groß gewählt wird, daß die Feldstärke nahe unterhalb der Öffnung 16 etwa gleich groß ist wie in der Öffnung 16. Hierdurch nehmen die Verzerrungen am Rand des Gesichtsfeldes ab, so daß das Gesichtsfeld vergrößert werden kann. Dies gilt insbesondere beider Verwendung von Druckstufenblenden 18, deren innere Kegelfläche 22 einen großen Kegelöffnungswinkel β hat und bei denen die Länge der Bohrungswandung 17 klein ist im Verhältnis zum Durchmesser 16 der Öffnung. Eine andere Möglichkeit zur Vergrößerung des Ge-

sichtsfeldes besteht darin, daß die am Rande des Gesichtsfeldes auftretenden Verzerrungen nachträglich mit Hilfe eines Bildverarbeitungsprogrammes korrigiert werden.

Für größere Abstände (beispielsweise 1000 μ m) und größere Spannungen (beispielsweise 200 V) zwischen der Probe 11 und der Druckstufenblende 18 erhält man eine Sekundärelektronenkaskade als zusätzliche Vorverstärkung. Bei der Verwendung einer ausreichend großen Druckstufenblendenöffnung 16 (> 200 μ m, beispielsweise 250 μ m) gelangen genug Sekundärelektronen in die Öffnung 16, um hiermit auch bei größeren Abständen eine gute Detektionseffizienz zu erhalten.

Auch innerhalb der Öffnung 16 der Druckstufenblende ist für den Weitertransport der Sekundärelektronen nach oben das elektrische Feld maßgeblich mitverantwortlich. Der elektrische Feldverlauf ist diesbezüglich um so günstiger, je kleiner die Länge der Bohrung 16 im Vergleich zu ihrem Durchmesser ist. Insofern wird eine Druckstufenblende 18 bevorzugt, wie sie in Fig. 5 dargestellt ist, die gar keine zylindermantelförmige Bohrungswandung 17 hat, sondern statt dessen nur eine scharfe Innenkante als Begrenzung zwischen der Unterseite 14 und der Oberseite 22 der Druckstufenblende aufweist.

Neben den elektrischen Feldern zwischen der Probe 11 und der Druckstufenblende 18 und innerhalb der Öffnung 16 ist auch das Magnetfeld, das durch die in Fig. 1 abgebildete Einpollinse 64 erzeugt wird, sehr hilfreich für den Transport der Sekundärelektronen zur Öffnung 16 und durch die Öffnung 16 hindurch. Durch das Magnetfeld wird die senkrecht zur optischen Achse 79 stehende Bewegungskomponente der Sekundärelektronen mit Hilfe der Lorentzkraft auf eine Kreisbahn umgelenkt. Hierdurch wird erreicht, daß ein von der Probe emittiertes Sekundärelektron auf seinem Weg nach oben seinen Abstand von der optischen Achse 79 zwischen zwei Stößen maximal um seinen doppelten Larmorradius vergrößern kann. Die niederenergetischen Sekundärelektronen, deren Wirkungsquerschnitt für elastische Streuung besonders hoch ist, haben dabei günstigerweise auch einen besonders kleinen Larmorradius. Insbesondere für die Sekundärelektronen mit einer Energie von mehr als 10 eV kommt begünstigend hinzu, daß kleinere Streuwinkel wesentlich wahrscheinlicher sind als große Streuwinkel. Dies führt dazu, daß der Abstand zwischen den Kreismittelpunkten der Bewegung vor dem Stoß und nach dem Stoß wesentlich geringer ist als die Summe der beiden Larmorradien. Da sich die Sekundärelektronen weniger weit von der optischen Achse 79 entfernen können, gelangen bei Verwendung einer Einpollinse mehr Sekundärelektronen durch die Öffnung 16 der Druckstufenblende als ohne Einpollinse.

Für den Transport der Sekundärelektronen durch den Zwischenraum zwischen den Druckstufenblenden 18 und 44 und durch die Öffnung 41 der oberen Druckstufenblende hindurch spielt das Magnetfeld der Einpollinse 64 ebenfalls eine wichtige Rolle, falls es vorhanden ist. Die Druckstufenblenden werden so angeordnet, daß die magnetischen Feldlinien, die durch die Öffnung der unteren Druckstufenblende 18 gehen, auch durch die Öffnung 41 der oberen Druckstufenblende gehen.

(Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Öffnung der oberen Druckstufenblende 44 nicht wesentlich kleiner ist als die Öffnung der unteren Druckstufenblende 18 und die obere Druckstufenblende 44 unterhalb des Polschuhs 58 angebracht ist, wie es in den Figuren 1, 6, 7, 8, 9 und 10 dargestellt ist.) Da oberhalb der unteren Druckstufenblende keine starke Streuung mehr stattfindet, wird hierdurch erreicht, daß alle Sekundärelektronen, die durch die untere Druckstufenblende gelangen, auch durch die obere Druckstufenblende gelangen, sofern sie nicht durch die zunehmende magnetische Feldstärke zum Umkehren gezwungen werden. Letzteres trifft nur auf die Sekundärelektronen mit großen Winkeln gegenüber der optischen Achse zu. Durch Anlegen einer zusätzlichen Spannung zwischen den Elektroden 18 und 44 läßt es sich vollständig vermeiden.

Oberhalb der Öffnung 16 der unteren Druckstufenblende 18 in Fig. 2 nimmt der Druck bis zur Öffnung 41 der oberen Druckstufenblende 44 gegenüber dem Druck der Probenkammer um mehrere Zehnerpotenzen ab. Die Druckabnahme ist abhängig von der Größe der Öffnung 16 der unteren Druckstufenblende. Diese Druckabnahme nach oben hin bewirkt eine Zunahme der mittleren freien Weglänge der Sekundärelektronen.

Bei niedrigem Druck (beispielsweise 1 hPa) in der Probenkammer oder kleinem Durchmesser (beispielsweise 200 µm) der unteren Druckstufenblendenöffnung 16 oder wenn die Sekundärelektronen beim Erreichen der Öffnung 16 verhältnismäßig energiereich sind (beispielsweise 20 eV), ist kein zusätzliches elektrisches Feld oberhalb der Druckstufenblende 18 erforderlich, um die Sekundärelektronen durch die obere Druckstufenblendenöffnung 41 zu lenken, wenn das Magnetfeld der Einpollinse 64 vorhanden ist, um die Sekundärelektronen durch die obere Druckstufenblendenöffnung 41 zu lenken.

Falls die Einpollinse 64 nicht vorhanden oder nicht ausreichend stark aktiviert ist, werden die Sekundärelektronen in den Ausführungsbeispielen aus Fig. 2 bis 4 durch das elektrische Feld zwischen den beiden Druckstufenblenden auf die obere Druckstufenblendenöffnung 41 fokussiert, oberhalb der ein gutes Vakuum herrscht, in dem die Sekundärelektronen detektiert werden. Bei diesem Funktionsprinzip ist es erforderlich, daß die Sekundärelektronen keine Stöße mehr ausführen, wenn sie auf die Öffnung 41 der oberen Druckstufenblende fokussiert werden. Dies wird durch die Abnahme des Druckes und die Zunahme der elektrischen Feldstärke oberhalb der Öffnung der unteren Druckstufenblende 18 erreicht. Gleichzeitig mit der Zunahme der mittleren freien Weglänge der Sekundärelektronen nimmt auch die elektrische Feldstärke oberhalb der Öffnung 16 aufgrund der konischen Form der Elektrode 18 nach oben hin stark zu. Beides zusammen führt dazu, daß die Geschwindigkeit, die die Sekundärelektronen zwischen zwei Stößen erreichen, oberhalb der Öffnung 16 stark zunimmt. Da außerdem auch mit zunehmender Geschwindigkeit die mittlere freie Weglänge der Sekundärelektronen zunimmt, werden die Sekundärelektronen oberhalb der Öffnung 16 innerhalb ihrer freien Weglänge so schnell (und nimmt dabei ihre mittlere freie Weglänge so stark zu),

daß die Sekundärelektronen keine Stöße mehr ausführen.

Viele Sekundärelektronen haben ihren letzten Stoß also in geringer Entfernung oberhalb der Öffnung 16. Durch das elektrische Feld zwischen den beiden Elektroden 18 und 44 werden sie anschließend auf die Öffnung 41 der oberen Druckstufenblende fokussiert. Falls die Einpollinse 64 in Betrieb ist, sind beliebige Kegelöffnungswinkel $\beta \le 90^{\circ}$ möglich. Falls die Einpollinse 64 nicht in Betrieb ist, beträgt der Kegelöffnungswinkel β für die innere Kegelfläche 22 bevorzugt zwischen 20° und 75°. Auch unter der Nebenbedingung, daß die elektrische Feldstärke in der Öffnung 41 und direkt unterhalb der Öffnung 41 gleichgroß sein soll, ist die Fokussierung der Sekundärelektronen auf die Öffnung 41 problemlos möglich. Sogar bei einer vorgegebenen Potentialdifferenz zwischen den Elektroden 44 und 55 und bei vorgegebenen Kegelöffnungswinkeln β und γ wird die Fokussierung der Sekundärelektronen auf die Öffnung 41 erreicht, indem die Lage der Elektrode 44 geeignet gewählt wird: Wenn die Elektrode 50 etwas länger ausgeführt wird und dadurch die Elektrode 44 (mit entsprechend kleinerem Außendurchmesser) etwas weiter unten angeordnet ist, erhält man eine geringere elektrische Feldstärke in der Öffnung 41. Dementsprechend wird auch die Potentialdifferenz zwischen den Elektroden 18 und 44 so stark verringert, daß direkt unterhalb der Öffnung 41 wieder die gleiche Feldstärke herrscht wie in der Öffnung 41. Hierdurch erhält man eine schwächere Fokussierung der Sekundärelektronen, während gleichzeitig auch noch die Wegstrecke verkürzt wird, auf der die Sekundärelektronen fokussiert werden. (Aufgrund der geringeren Potentialdifferenz zwischen den Elektroden 18 und 50 kann diese Strecke noch weiter verkürzt werden, indem der Abstand zwischen den beiden Elektroden verkleinert wird.)

Es kann also auch ohne das Magnetfeld der Einpollinse 64 durch die Anordnung der Elektrode 44 in geeigneter Höhe immer erreicht werden, daß die Sekundärelektronen durch das elektrische Feld auf die Öffnung 41 fokussiert werden. (Nur für sehr große Kegelöffnungswinkel β ist dies nicht möglich.) Eine weitere Möglichkeit, um die Feldstärke in der Öffnung 41 zu vergrößern und dementsprechend die Fokussierung der Sekundärelektronen zu verstärken, besteht darin, die Elektrode 44 in Fig. 2 mit der ebenen Fläche nach oben in die Öffnung der Elektrode 50 einzubauen.

Falls der Durchmesser der Öffnung 41 so klein gewählt wird, daß sich beim Betrieb ohne ausreichendes Magnetfeld der Einpollinse 64 bei unterschiedlich großem Gasdruck in der Probenkammer die etwas unterschiedliche Fokussierung der Sekundärelektronen bemerkbar macht, besteht eine bevorzugte Ausführungsform darin, daß die Fokussierung der Sekundärelektronen auf die Öffnung 41 eingestellt werden kann. (Es ist dabei keine starke Veränderung der Fokussierung erforderlich.) Die Fokussierung der Sekundärelektronen auf die Öffnung 41 wird beispielsweise erreicht, wenn die Spannung zwischen den Elektroden 18 und 44 und proportional dazu auch die Spannung zwischen den Elektroden 44 und 55 verändert werden kann. Eine andere Möglichkeit besteht darin,

daß eine der Druckstufenblenden 18 oder 44 höhenverstellbar (d.h. in ihrer Lage entlang der optischen Achse verstellbar) ist. Eine weitere Möglichkeit zur Veränderung der Fokussierung ergibt sich bei der Verwendung einer nicht als Druckstufenblende wirkenden, zusätzlichen Elektrode mit größerem Öffnungsdurchmesser, die zwischen den Elektroden 18 und 44 angebracht und vorzugsweise über eine Isolierung an einer dieser beiden Elektroden befestigt und zentriert ist. Die Potentiale der Elektrode 18 und der zusätzlichen Elektrode können dann so verändert werden, daß die Äquipotentialflächen in der Öffnung 41 weiterhin eben bleiben, während die Fokussierung der Sekundärelektronen verändert wird. Die hier angesprochene einstellbare oder veränderliche Fokussierung der Elektronen ist insbesondere für große Druckstufenblendenöffnungen 16 wichtig.

Der weitere Weg der Sekundärelektronen oberhalb der Elektrode 44 wird im folgenden anhand von Fig. 1 erläutert. Die Sekundärelektronen werden durch das elektrische Feld zwischen den Elektroden 44 und 55 weiter beschleunigt und fliegen mit hoher kinetischer Energie zum Detektor 74. Durch die starke Abnahme des Gasdruckes innerhalb und oberhalb der Druckstufenblenden 18 und 44 wird erreicht, daß trotz des erhöhten Druckes in der Probenkammer am Ort des Detektors 74 ein hinreichend gutes Vakuum für den Einsatz von Detektoren mit hoher Nachweisempfindlichkeit vorhanden ist. Als Detektor 74 sind insbesondere Szintillator-Lichtleiter-Kombina- tionen, Channelplates und Halbleiterdetektoren mit einem Metall-Halbleiter-Übergang oder mit einem p-n-Übergang gut geeignet. Es können auch Szintillator-Photomultiplier-Kombinationen auf der Basis von Plastikszintillatoren YAG-Szintillatoren, YAP-Szintillatoren und dgl. verwendet werden. Bei Verwendung einer Channelplate ist es empfehlenswert, eine zusätzliche Liner-Elektrode für die Öffnung des Detektors vorzusehen, wie sie in DE 3703029 A1 verwendet wird.

Fig. 3 zeigt für denselben Ausschnitt wie in Fig. 2 eine andere Variante eines erfindungsgemäßen Druck-REMs zur Illustration des oben genannten zweiten Gesichtspunkts. Die obere Druckstufenblende in Fig. 3 ist schichtweise aufgebaut: Ihre Unterseite 39 und Oberseite 43 bestehen aus leitfähigen Materialien, während in ihrem Inneren zumindest eine Schicht aus isolierendem Material besteht. Die Kontaktierung der leitfähigen Schichten 39 und 43 liegt außerhalb des dargestellten Bereiches.

Die Potentiale der Elektroden 18, 39, und 43 werden so gewählt, daß in den Öffnungen der Elektroden 39 und 43 und im Bereich 41 zwischen den Öffnungen der beiden Elektroden dieselbe elektrische Feldstärke herrscht. Da die bevorzugte Dicke der Elektroden 39 und 43 in der Nähe der optischen Achse 79 sehr klein (≤ 100 μm) ist, sind die Äquipotentialflächen im Bereich der Öffnungen der Elektroden 39 und 43 und im Bereich 41 dazwischen nahezu eben. Der bevorzugte Abstand zwischen den Elektroden 39 und 43 beträgt 10 bis 1000 μm. Eine geeignete Möglichkeit zur Herstellung einer solchen, schichtweise aufgebauten Druckstufenblende mit sehr dünnen Elektroden 39 und 43 besteht beispielsweise darin, daß die Elektroden 39 und 43 Metallbeschichtungen eines Iso-

lators darstellen, zwischen denen der Isolator in einem Bereich um die optische Achse herum weggeätzt wurde. Die Öffnung der Elektrode 39 kann auch gleichgroß oder größer sein als die Öffnung der Elektrode 43 und es können auch mehr als zwei leitfähige Schichten verwendet werden. Weiterhin kann auch die untere Druckstufenblende 18 schichtweise aufgebaut werden. Die leitfähigen Schichten können dabei insbesondere eben, kegelförmig oder kegelstumpfförmig sein. Die Verwendung einer schichtweise aufgebauten unteren Druckstufenblende 18 hat insbesondere als Vorteile, daß der Transport der Sekundärelektronen zum Detektor verbessert wird, daß das Gesichtsfeld vergrößert werden kann und daß der Fehlerkoeffizient der an die Druckstufenblende angrenzenden elektrostatischen Linse verringert werden kann.

Fig. 4 zeigt für eine andere Variante eines erfindungsgemäßen Druck-REMs einen Ausschnitt mit den Druckstufenblenden. Der Unterschied gegenüber der Variante aus Fig. 2 besteht in der zusätzlichen Halterung 40 für die Druckstufenblende 44 und darin, daß die Elektrode 50 in Fig. 4 ohne die dazwischenliegende Isolierung 56 als direkte Fortsetzung des Polschuhs 58 ausgeführt ist, so daß sie eine besonders gute Zentrierung in Bezug auf die optische Achse aufweist und geerdet ist. Bei dieser Variante ist die Elektrode 50 nicht demontierbar, während die Teile 13, 18, 40, 42 und 44 (und 60, 63, 65, 68 und 69 aus Fig. 1) für den Betrieb des Druck-REMs mit Vakuum in der Probenkammer entfernt werden können. Das nach der Entfernung übrigbleibende REM für den Vakuumbetrieb entspricht, abgesehen von der zusätzlichen Einpollinse, weitgehend den herkömmlichen Bauformen von REMs ,wie sie beispielsweise von den Firmen "ICT" oder "LEO" angeboten werden.

Die als Federelement ausgeführte Halterung 40 hält die Druckstufenblende 44, die an der Bohrung der Elektrode 50 zentriert ist, in ihrer Lage. Es wäre auch möglich, als Halterung ein Federelement zu verwenden, das sich über eine Isolierung am darunterliegenden Bauteil 18 abstützt. Ferner könnte man die Druckstufenblende 18 auch an der entsprechend umgestalteten Außenkante der Elektrode 50 zentrieren. Es ist auch möglich, die obere Druckstufenblende 44, ihre Halterung 40 und das zusätzliche Abpumpen durch den Wellschlauch 63 (siehe Fig. 1) wegzulassen. Dies hat den Vorteil eines vereinfachten Aufbaus mit vereinfachter Montierbarkeit, bei dem auch ohne Einpollinse 64 keine Fokussierung der Sekundärelektronen erforderlich ist und kein negativer Einfluß einer oberen Druckstufenblende 44 auf die Fokussierung des Primärelektronenstrahls möglich ist. Es können mit dieser Variante ohne obere Druckstufenblende 44 bei gleichbleibendem Öffnungsdurchmesser der verbleibenden Druckstufenblende 18 jedoch nur wesentlich kleinere Drücke in der Probenkammer verwendet werden. Diese Variante mit nur einer Druckstufenblende unterhalb des Detektors 74 ist deshalb weniger zur Beobachtung feuchter Proben mit großem Gesichtsfeld geeignet, sondern hauptsächlich für Anwendungsfälle, bei denen das Gas in der Probenkammer zur Aufladungsbekämpfung verwendet wird.

Wenn die Einpollinse 64 nicht in Betrieb 1st, wird beim Vakuumbetrieb mit den in Fig. 2 bis Fig. 4 dargestellten Aufbauten nahe oberhalb der Öffnung 16 ein erster Sekundärelektronen-Crossover erhalten, der durch das elektrische Feld zwischen den Elektroden 18 und 44 (bzw. 39) auf die Öffnung 41 abgebildet wird. Die Fokussierung der Sekundärelektronen auf die Öffnung 41 wird dabei durch das Anlegen einer kleinen Spannung zwischen der Probe11 und der Elektrode 18 und/oder durch eine der in Zusammenhang mit Fig. 2 beschriebenen Maßnahmen zur Veränderung der Fokussierung der Sekundärelektronen erreicht. Für den Vakuumbetrieb mit den in Fig. 2 bis 4 ausschnittsweise dargestellten Druck-REMs ist die Kombination mit einem zusätzlichen oberen Detektor 91 aus Fig.8 oder Fig.9 vorteilhaft.

Wenn die Einpollinse 64 nicht in Betrieb ist, müssen die Sekundärelektronen in den Ausführungsbeispielen aus Fig. 2 bis 4 auf die Öffnung 41 der oberen Druckstufenblende fokussiert werden. In Fig. 5 ist hingegen ein Ausführungsbeispiel dargestellt, bei dem die Sekundärelektronen auch ohne das Magnetfeld der Einpollinse nicht auf eine bestimmte Stelle fokussiert werden müssen und dementsprechend auch die für die Sekundärelektronen-Fokussierung maßgeblichen Parameter frei gewählt werden können. Ein weiterer Vorteil der in Fig. 5 dargestellten Ausführung besteht darin, daß auch ohne das Magnetfeld der Einpollinse 64 ein sehr großer Anteil der Sekundärelektronen zum Signal des Detektors beiträgt.

Der Weg des Primärelektronenstrahls durch die Öffnungen 41 und 16 zur Probe 11, die Spannung zwischen der Probe 11 und der Druckstufenblende 18, der Weg der Sekundärelektronen von der Probe 11 zur Öffnung 16 und durch die Öffnung 16 hindurch, die Größe der Öffnung 16, die Zunahme der elektrischen Feldstärke oberhalb der Öffnung 16 und die Druckabnahme oberhalb der Öffnung 16 sind dieselben wie in Fig. 2. Statt der dünnwandigen Druckstufenblende 44 in Fig. 2 wird in Fig. 5 jedoch das dickwandige Bauteil 42 verwendet. Seine bevorzugte Dicke (Länge des Durchgangs 41) beträgt 0,4 mm bis 6 mm. Es ist schichtweise aus isolierenden und leitfähigen Schichten aufgebaut, die senkrecht zur optischen Achse 79 verlaufen und in Fig. 5 durch die horizontale Schraffur des Bauteils 42 angedeutet sind. Die leitfähigen Schichten haben dabei eine bevorzugte Dicke von weniger als 200 µm, während die isolierenden Schichten auch dicker sein können. Das Bauteil 42 ist in die isolierende Halterung 40 eingepaßt, die das Bauteil 42 an der Bohrung der Elektrode 50 zentriert. Die Oberseite des Bauteils 42 ist von der leitfähigen Schicht 43 bedeckt, die eine Elektrode bildet, die auf demselben Potential wie die Elektrode 50 liegt. Die Unterseiten des Bauteils 42 und der Halterung 40 sind von der leitfähigen Schicht 39 bedeckt. Sie bildet eine Elektrode, die gegenüber der Elektrode 43 auf negativem Potential liegt. Das Bauteil 42 hat einen mittleren Durchgang 41 um die optische Achse 79 herum und zusätzlich noch mehrere Durchgänge 36 über den Umfang verteilt.

Die Oberfläche der Durchgänge 36 und 41 ist mit einer schlecht leitfähigen Schicht bedeckt,

deren elektrische Parameter beispielsweise denen einer schlecht leitfähigen Schicht entsprechen, wie sie in einem Channeltron oder einer Channelplate verwendet wird. Die schlecht leitfähige Schicht in den Durchgängen 36 und 41 hat einen Gesamtwiderstand, der entlang der optischen Achse gleichmäßig verteilt ist. (Um eine gleichmäßige Verteilung des Widerstandes längs der optischen Achse zu erreichen, kann auch eine zusätzliche schlecht leitfähige Schicht an der Grenzfläche zum Bauteil 40 auf dem Bauteil 42 aufgebracht sein). Dadurch entsteht zwischen den Elektroden 39 und43, mit denen die schlecht leitfähige Schicht kontaktiert ist, ein homogenes elektrisches Feld in den Durchgängen 36 und 41. Der schichtweise Aufbau des Bauteils 42 aus abwechselnd dünnen isolierenden und leitfähigen Schichten ergibt auch bei einer etwas ungleichmäßigen Verteilung der schlecht leitfähigen Schicht im Durchgang 41 ein rotationssymmetrisches elektrisches Feld, so daß eine gute Auflösung erreicht wird.

Die Größe der Spannung zwischen den Elektroden 50 und 55 wurde in Zusammenhang mit Fig. 1 besprochen. Die Spannung zwischen den Elektroden 39 und 43 ist so groß, daß die elektrische Feldstärke innerhalb des Durchgangs 41 gleichgroß ist wie direkt oberhalb des Durchgangs 41. Die Spannung zwischen den Elektroden 25 und 39 ist so groß, daß die elektrische Feldstärke direkt unterhalb des Durchgangs 41 gleichgroß ist wie innerhalb des Durchgangs 41. Die Druckstufenblende 18 liegt auf demselben Potential wie die Elektrode 25 und ist leicht demontierbar an der Elektrode 25 befestigt. Eine bevorzugte Ausgestaltung des Aufbaus aus Fig. 5 besteht darin, daß die Druckstufenblende 18 gewechselt werden kann, ohne daß die Probenkammer belüftet wird. Eine entsprechende Vorrichtung zum Auswechseln der Druckstufenblende (nicht dargestellt) kann beispielsweise am Rand des Probentisches angebracht sein.

Die langgestreckten schmalen Durchgänge 36 und 41 stellen einen großen Strömungswiderstand für das Gas dar, das sich unterhalb des Bauteils 42 befindet. Dieser Strömungswiderstand ist um mehr als eine Größenordnung höher als der Strömungswiderstand beim Abpumpen durch die in Fig. 1 dargestellte Elektrode 55. Der bevorzugte Durchmesser des Durchgangs 41 beträgt 100 bis 2000 μm. Der bevorzugte Durchmesser der Durchgänge 36 ist kleiner als der bevorzugte Durchmesser des Durchgangs 41. Die Durchgänge 36 können sich, wie in Fig. 5 dargestellt, nach unten hin aufweiten, so daß auf der Unterseite des Bauteils 42 nur schmale Stege zwischen den Durchgängen 36 übrig bleiben. Hierdurch wird der Anteil der Sekundärelektronen, die in die Durchgänge 36 gelangen, vergrößert.

Die Sekundärelektronen gelangen in Fig. 5 (je nach Fokussierung der Sekundärelektronen) in den Durchgang 41 und/oder in die Durchgänge 36. Wenn ein Sekundärelektron auf die schlecht leitfähige Schicht an der Oberfläche eines Durchgangs trifft, erzeugt es dort mit hoher Wahrscheinlichkeit mindestens ein Sekundärelektron (wie in einem Channeltron oder einer Channelplate) und liefert dadurch einen Beitrag zum Signal des Detektors.

Mit dem in Fig. 5 dargestellten Aufbau ist auch der Betrieb mit Vakuum oder sehr geringem Druck in der Probenkammer möglich. Wenn die untere Druckstufenblende 18 entfernt wird, wird hiermit auch bei großem Abstand (> 5 mm) zwischen der Probe 11 und der Elektrode 25 eine gute Auflösung und eine gute Detektionseffizienz erreicht. Die Spannung zwischen den Elektroden 25 und 39 ist dabei so groß, daß die elektrische Feldstärke direkt unterhalb des Durchgangs 41 gleichgroß ist wie innerhalb des Durchgangs 41. Ein sehr großes Gesichtsfeld erhält man hiermit bei Verwendung eines Doppelablenkelementes, wenn das Rasterzentrum nahe oberhalb oder in den Durchgang 41 gelegt wird.

Eine besonders vorteilhafte und bevorzugte Ausgestaltung des in Fig. 5 dargestellten Aufbaus besteht darin, daß das Bauteil 42 sehr nahe an der unteren Druckstufenblende 18 angeordnet wird (mit einem bevorzugten Abstand von weniger als 2 mm zur Druckstufenblende 18). Hierbei wird auf die Durchgänge 36verzichtet und der Durchgang 41, das Bauteil 42, die Isolierung40 und die leitfähige Schicht 39 verjüngen sich kegelförmig nach unten hin. Für nicht zu kleine Vergrößerungen (≥ ca. 1000-fach) ergibt diese Variante in Verbindung mit der Einpollinse 64 eine sehr gute Detektionseffizienz. Für kleine Vergrößerungen wird die Einpollinse 64 ausgeschaltet.

Die Ausführungsbeispiele aus Fig. 1, Fig. 3 und Fig. 5 sind mit einer kombinierten elektrostatischen und magnetischen Objektivlinse vorgesehen. Die in Fig. 2 und Fig. 4 dargestellten Ausführungsbeispiele sind sowohl in Verbindung mit einer kombinierten elektrostatischen und magnetischen Objektivlinse, als auch mit einer rein magnetischen Objektivlinse, die ein Magnetfeld zwischen den Druckstufenblenden erzeugt (beispielsweise einer Einpollinse), funktionstüchtig. Im Fall einer rein magnetischen Objektivlinse, kann die Spannung zwischen den Druckstufenblenden 18 und 44 geringer sein als bei einer kombinierten elektrostatischen und magnetischen Objektivlinse oder beide Druckstufenblenden können sogar auf demselben Potential liegen. Durch die geringere elektrische Feldstärke im Bereich der oberen Druckstufenblende 44 entfällt auch die Notwendigkeit einer besonders dünnen Druckstufenblende 44, sondern es können beispielsweise auch handelsübliche Aperturblende als Druckstufenblende verwendet werden.

Fig. 6 und Fig. 7 zeigen Ausführungsbeispiele mit rein magnetischer Objektivlinse. In Fig. 6 ist ein Ausschnitt aus einer Objektivlinse zu sehen, wie sie an sich aus EP 0767482 (Fig. 1) bekannt ist. Diese Objektivlinse kann sowohl mit der Linse 62 mit axialem Polschuhspalt, als auch mit der außerhalb des in Fig. 6 dargestellten Bereiches liegenden Einpollinse betrieben werden, deren innerer Polschuh 58 bis nahe zur Probe reicht. Beim Betrieb mit der Einpollinse findet die Detektion in Fig. 6 in dem Bereich zwischen dem Polschuh 58 und der Linse 62 statt, der gegenüber den Magnetfeldern der beiden Objektivlinsen abgeschirmt ist. Dabei wird das Signal mit Hilfe eines Lichtleiters durch eine Bohrung im Polschuh 58 weitergeleitet, um außerhalb des dargestellten Bereiches von einem Photomultiplier verstärkt zu werden. Wenn die Einpollinse nicht in Betrieb ist, ist mit dem in

Fig. 6 dargestellten Aufbau der Betrieb mit Gas in der Probenkammer nur für Arbeitsabstände ab ungefähr einem Millimeter mit einer Kollektorelektrode oder einem Gasszintillationsdetektor möglich. In Fig. 6 findet die Detektion in diesem Fall mit Hilfe der Kollektorelektrode 13 statt und es wird bevorzugt ein Doppelablenkelement verwendet, mit dem um einen Punkt zwischen den beiden Druckstufenblenden gerastert wird.

Die elektrische Feldstärke oberhalb der Druckstufenblende 18 kann bei der Gestaltung gemäß den Figuren 6 und 7 in breiten Bereichen frei gewählt werden. Sie kann wesentlich geringer sein als bei der Gestaltung gemäß den Figuren 2 bis 5 mit kombinierter elektrostatischer und magnetischer Objektivlinse und kann auch ganz verschwinden, wie in Fig. 6, in der die beiden Druckstufenblenden 18 und 44 auf demselben Potential liegen. Dies hat den Vorteil, daß die beiden Druckstufenblenden mit Hilfe des leitfähigen Bauteils 19 in einer sehr einfachen Konstruktion zu einer Baugruppe 26 zusammengefaßt werden können, die (wie in Fig. 5) leicht demontierbar an dem Bauteil 25 befestigt ist.

In Fig. 6 ist oberhalb der unteren Druckstufenblende 18 keine Elektrode vorgesehen, die demgegenüber auf positivem Potential liegt. Eine gegenüber Fig. 6 noch weiter verbesserte Detektionseffizienz erhält man hingegen mit einer Abwandlung des in Fig. 6 dargestellten Ausführungsbeispiels, bei der die obere Druckstufenblende 44 auf positivem Potential gegenüber der unteren Druckstufenblende 18 liegt. Die obere Druckstufenblende kann dann vorteilhaft über den Polschuh 58 oder über die Elektrode 67 kontaktiert werden und das Bauteil 19 hat eine geringere Bauhöhe und einen größeren Außendurchmesser und beinhaltet eine Isolation.

Der Primärelektronenstrahl verläuft in Fig. 6 in Nähe der optischen Achse 79 und wird durch das Magnetfeld der Linse 62 mit axialem Polschuhspalt und/oder durch das Magnetfeld der Einpollinse auf die Probe 11 fokussiert. Der Weg des Primärelektronenstrahls durch die Öffnung der Druckstufenblende 18 zur Probe 11, die Spannung zwischen der Probe 11 und der Druckstufenblende 18 und die Bewegung der Sekundärelektronen von der Probe 11 zur Öffnung der Druckstufenblende 18 sind in Fig. 6 dieselben wie in Fig. 2 bei Verwendung der Einpollinse 64. Der Unterschied besteht darin, daß in Fig. 6 kein elektrisches Feld oberhalb der Druckstufenblende 18 und damit auch kein Felddurchgriff nach unten durch die Öffnung der Druckstufenblende 18 vorhanden ist, so daß die Probe 11 und die Druckstufenblende 18 nicht auf demselben Potential liegen dürfen, sondern die Druckstufenblende gegenüber der Probe auf positivem Potential liegen sollte.

Je nach Gasdruck, Öffnungsdurchmesser der Druckstufenblende 18, Abstand zwischen der Probe und der Druckstufenblende, Probenkippung, Primärenergie und Vergrößerung beträgt die bevorzugte Spannung zwischen der Probe und der Druckstufenblende in Fig. 6 beim Betrieb mit angeregter Einpollinse wenige Volt bis einige hundert Volt. Bei Wasserdampf mit beispielsweise 10 mbar Gasdruck, einer magnetischen Flußdichte von beispielsweise 200 mT am Ort der Probe und

beispielsweise 250 µm als Druckstufenblendenöffnungsdurchmesser und als Abstand zwischen der Probe und der Druckstufenblende ist beispielsweise eine Spannung von wenigen Volt ausreichend für den Transport der Sekundärelektronen zur unteren Druckstufenblendenöffnung. Für die oben angesprochene Abwandlung des in Fig. 6 dargestellten Ausführungsbeispiels, bei der die obere Druckstufenblende 44 auf positivem Potential gegenüber der unteren Druckstufenblende 18 liegt. findet auch bei dieser geringen Spannung zwischen der Probe und der Druckstufenblende ein effektiver Weitertransport der Sekundärelektronen oberhalb der unteren Druckstufenblende 18 statt. Für das in Fig. 6 dargestellte Ausführungsbeispiel, ohne elektrisches Feld im Bereich innerhalb und oberhalb der unteren Druckstufenblendenöffnung, haben die dort ankommenden Sekundärelektronen mit einer Energie von wenigen Elektronenvolt jedoch eine nur schwach vorwärts gerichtete Winkelverteilung ihrer Bewegungsrichtung und führen elastische Stöße mit verhältnismäßig großen mittleren Streuwinkeln aus. Eine geringere Streuwahrscheinlichkeit, einen geringeren mittleren Streuwinkel und eine stärker vorwärts gerichtete Winkelverteilung der Bewegungsrichtung erhält man hingegen, wenn man beispielsweise eine Spannung von 20 Volt anlegt. Wesentlich höhere Spannungen bis zu mehreren hundert Volt können je nach Probenkippung und Vergrößerung ebenfalls vorteilhaft sein, weil unter den Bedingungen des obigen Beispiels dann eine schwache Sekundärelektronenkaskade entstehen würde. Der Verstärkungsfaktor wäre im Zusammenhang mit einer Kollektorelektrode oder einem Gasszintillationsdetektor zwar völlig ungenügend, stellt im Zusammenhang mit dem hochempfindlichen Detektor 51 jedoch einen zusätzlichen Gewinn dar, der den durch die breitere Energieverteilung etwas verringerten Anteil der Sekundärelektronen, die den Detektor 51 erreichen, je nach Aufbau des Detektors, durchaus überkompensieren kann.

Das durch die Öffnung 16 aus der Probenkammer einströmende Gas wird durch die seitliche Öffnungen 20 und das Rohr 31 abgepumpt. Wie in Fig. 2 findet auch in Fig. 6 eine starke Druckabnahme oberhalb der Öffnung 16 und eine Zunahme der mittleren freien Weglänge der Sekundärelektronen statt, so daß viele Sekundärelektronen ihren letzten Stoß in geringer Entfernung oberhalb der Öffnung 16 haben. Beim Betrieb mit angeregter Einpollinse werden die Sekundärelektronen auf Spiralbahnen gezwungen, auf denen sie durch die obere Druckstufenblendenöffnung 41 gelangen.

Die bevorzugte Größe der Öffnungen der Druckstufenblenden 18 und 44 ist abhängig vom gewünschten maximal zulässigen Druck in der Probenkammer, von der gewünschten kleinsten verwendbaren Primärenergie und von der Güte des Vakuums, das die Kathode benötigt. Es ist möglich, oberhalb der Druckstufenblende 44 weitere Druckstufenblenden einzufügen und die entstehenden Zwischenräume zu evakuieren. Die bevorzugten Durchmesser der Öffnungen der Druckstufenblenden 18 und 44 sind dieselben wie in Fig. 2, wobei die Öffnung 41 aber auch kleiner sein kann als die Öffnung der unteren Druckstufenblende 18. Denn die durch die Einpollinse erzeugte magnetische Flußdichte ist in der oberen Druckstufenblendenöffnung 41 wesentlich größer (und der Larmorradi-

us der Sekundärelektronen ist wesentlich kleiner) als in der Öffnung der unteren Druckstufenblende 18. Deshalb kann auch mit einer kleineren oberen Druckstufenblende erreicht werden, daß alle magnetischen Feldlinien, die durch die Öffnung der unteren Druckstufenblende gehen, auch durch die obere Druckstufenblendenöffnung gehen und dementsprechend auch nahezu alle Sekundärelektronen, deren Geschwindigkeitskomponente in Richtung der optischen Achse groß genug ist, so daß sie nicht durch die zunehmende magnetische Flußdichte zum Umkehren gezwungen werden. Bei der oben angesprochenen Abwandlung von Fig. 6, bei der die obere Druckstufenblende 44 gegenüber der unteren Druckstufenblende 18 auf positivem Potential liegt, gelangen sogar nahezu alle Sekundärelektronen, die durch die untere Druckstufenblende kommen, auch durch die obere Druckstufenblende.

Mit dem dargestellten Aufbau ist bei angeregter Einpollinse nicht nur der Betrieb mit Gas in der Probenkammer, sondern auch der Betrieb mit Vakuum in der Probenkammer möglich, wobei sich die Sekundärelektronen auf Spiralbahnen durch die Druckstufenblenden bewegen.

Um den qualitativen Verlauf der Magnetfelder zu veranschaulichen, sind in Fig. 6 beispielhaft zwei magnetische Feldlinien von der Probe bis zum Innenraum des Detektorgehäuses 72 eingezeichnet. Oberhalb der Druckstufenblendenöffnung 41 nimmt die magnetische Feldstärke stark ab. Das starke Magnetfeld der Einpollinse wird durch das sehr viel schwächere Magnetfeld der Zylinderspulen 66 und 71 abgelöst, das die Sekundärelektronen weiterhin nach oben leitet. Die Symmetrieachse dieser Magnetfelder fällt mit der optischen Achse zusammen. Oberhalb der Zylinderspule 71 befindet sich eine Gegenelektrode 78, die gegenüber dem Detektorgehäuse 72 auf negatives Potential gelegt werden kann und mit der Die Sekundärelektronen, je nach angelegter Spannung zwischen der Probe 11 und der Druckstufenblende 18, in Richtung der optischen Achse abgebremst und in Richtung zum Drahtnetz 75 gelenkt werden können. Außerdem werden Die Sekundärelektronen durch das von der Spule 71 erzeugte Magnetfeld 80 oberhalb der Zylinderspule 71 zum Drahtnetz 75 gelenkt. Die Sekundärelektronen treten durch das Drahtnetz 75 in das Detektorgehäuse 72 ein. Auf der anderen Seite des Drahtnetzes herrscht ein starkes elektrisches Feld, das Die Sekundärelektronen zum Detektor 51 beschleunigt, wo sie detektiert werden.

Die bevorzugte Spannung zwischen dem Drahtnetz 75 und dem Detektor 51 beträgt 1 bis 10 kV. Als Detektor 51 kann beispielsweise ein Halbleiterdetektor oder, wie in Fig. 6 dargestellt, ein Szintillator verwendet werden. Die Verwendung eines solchen, hochempfindlichen Sekundärelektronendetektors, dessen Hochspannung beim Gasdruck der Probenkammer unweigerlich zu Überschlägen führen würde, ist der Grund für das wesentlich bessere Signal-zu-Rausch-Verhältnis, das mit dem in Fig. 6 dargestellten Ausführungsbeispiel im Vergleich zu den bisher bekannten Rasterelektronenmikroskopen mit Gas in der Probenkammer erhalten wird.

Der Raum oberhalb der Druckstufenblende 44 wird durch den Zwischenraum zwischen den

Zylinderspulen, die auch in mehr als zwei Teile aufgeteilt sein können, und anschließend durch die in aus elektronenoptischen Gründen sowieso vorgesehenen zusätzlichen Bohrungen 38 abgepumpt. Das Rohr 32, durch das dabei abgepumpt wird, mündet in ein Bauteil, das gegenüber dem Polschuh durch die Dichtung 33 abgedichtet ist.

Eine starke konstruktive Vereinfachung in Fig. 6 kann erreicht werden, indem das Bauteil **25**,das Rohr **31**, die untere Druckstufenblende **18** und der dadurch überflüssigwerdende Teil des Bauteils **19** weggelassen werden. Bei gleichem Druck in der Probenkammer ist dann allerdings nur ein Betrieb mit sehr viel kleinerer Druckstufenblendenöffnung **41** möglich.

Zur Durchführung von energiedispersiver Röntgenspektroskopie (EDX) mit den Ausführungsbeispielen aus Fig. 6 (oder seiner oben genannten Abwandlung mit einer zusätzlichen Spannung zwischen den beiden Druckstufenblenden) und Fig. 7 ist in der Probenkammer außerhalb des dargestellten Bereiches in Richtung des mit "EDX" beschrifteten Pfeils ein EDX-Detektor angebracht. In Fig. 1 ist dies ebenfalls möglich. In Fig. 6 wird dabei bevorzugt ein Vorsatz 26 ohne Kollektorelektrode 13 verwendet, um die EDX-Detektion bei einem kleinen Abstand zwischen der Druckstufenblende 18 und der Probe 11 zu ermöglichen.

Der Abstand zwischen der Druckstufenblende 18 und der Probe 11 ist für EDX bevorzugt größer als der Durchmesser der Öffnung der Druckstufenblende 18 und kleiner als 1,5 Millimeter. Zwischen der Druckstufenblende und der Probe liegt eine Spannung von bevorzugt 50 bis mehreren 100 Volt, beispielsweise von 300 Volt an. Der Gasdruck in der Probenkammer wird so hoch gewählt, daß Aufladungen durch die von den beschleunigten Sekundärelektronen erzeugten Gasionen ausgeglichen werden. Die Verwendung eines kleinen Abstandes zwischen der Probe und der Druckstufenblende und eines dementsprechend höheren Gasdruckes hat dabei den Vorteil, daß die Gasionen die Probe wesentlich gezielter dort erreichen, wo die Aufladungen erzeugt werden. Sie vergrößert also die Effizienz der Aufladungsbekämpfung durch die Gasionen, indem ein größerer Prozentsatz der Gasionen die Probe in dem kleinen, betrachteten Bereich erreicht. Dadurch wird es möglich, das Produkt p·d (Druck mal Wegstrecke der Primärelektronen durch das Gas) zu verringern und dementsprechend mit verringerter Primärelektronenstreuung zu arbeiten. Außerdem treffen die gestreuten Primärelektronen mit einem geringeren Abstand von der momentan analysierten Probenstelle auf die Probe. Wenn die Einpollinse in Betrieb ist, können simultan zur Aufnahme von EDX-Spektren auch Sekundärelektronenbilder der Probe mit dem hochempfindlichen Detektor 51 aufgenommen werden. Im Gegensatz zu den heute bekannten Detektoren für erhöhten Druck in der Probenkammer eignet er sich besonders gut für den bei EDX vorteilhaften kurzen Abstand zwischen der Probe und der Druckstufenblende. Durch die verringerte Primärelektronenstreuung und das damit verbundene verringerte Signal von umliegenden Probenstellen wird die Nachweisempfindlichkeit in den EDX-Spektren stark verbessert. Wahlweise kann auch die Primärenergie verringert und

dadurch die Ortauflösung für die EDX-Spektren verbessert werden. Damit sind die größten Nachteile heutiger EDX-Spektren mit Gas in der Probenkammer verringert.

Den Vorteil einer geringeren Primärelektronenstreung aufgrund einer effektiveren Aufladungsbekämpfung bei einem verringerten Abstand zwischen der Probe und der Druckstufenblende, wie er durch die Ausführungsbeispiele in Fig. 1 bis Fig. 9 möglich wird, erhält man nicht nur für EDX, sondern für alle Anwendungsfälle im Zusammenhang mit Aufladungsbekämpfung.

Für den beispielsweise bei Metrologiegeräten in der Halbleiterproduktion auftretenden Anwendungsfall der Aufladungsbekämpfung an einer ebenen Probe, die nicht gekippt werden muß, stellt eine Abwandlung der in Fig. 1 bis Fig. 3 dargestellten Ausführungsbeispiele eine bevorzugte Ausführungsform dar. Bei dieser Abwandlung sind beide Druckstufenblenden 18 und 44 eben und sowohl zwischen den Druckstufenblenden als auch zwischen der unteren Druckstufenblende 18 und der Probe 11 liegt ein homogenes elektrisches Feld an. Außerdem ist bei dieser Ausführungsform, bei der die Linse 62 weggelassen werden kann, der innere Polschuh 58 der Einpollinse 64 weit herunter gezogen, so daß das elektrische Feld zwischen der Elektrode 55 und dem Polschuh 58 die elektrostatische Linse bildet. Der Vorteil dieser Ausführungsform besteht neben der einfachen Herstellbarkeit insbesondere in den vergleichsweise geringen Anforderungen an die Zentrierbarkeit der beiden Druckstufenblenden, so daß auch keine Vorrichtung zum Zentrieren der unteren Druckstufenblende 18 erforderlich ist.

Denselben Vorteil der unproblematischen Zentrierung erhält man auch für eine andere Abwandlung des in Fig. 1 und Fig. 2 dargestellten Ausführungsbeispiels, die nicht nur zur Aufladungsbekämpfung vorgesehen ist und bei der die untere Druckstufenblende 18 die in Fig. 1 und Fig. 2 dargestellte konische Form aufweist, so daß auch Probenkippung möglich ist. Bei dieser bevorzugten Ausführungsform wird ebenfalls eine Einpollinse 64 verwendet, deren innerer Polschuh 58 weit herunter gezogen ist, so daß er zusammen mit der Elektrode 55 die elektrostatische Linse bildet. Die ebene obere Druckstufenblende 44 liegt bei dieser Ausführungsform aber auf einem positiven Potential gegenüber dem geerdeten Polschuh 58. Hierdurch wird eine geringe Feldstärke innerhalb der oberen Druckstufenblendenöffnung 41 erreicht, so daß nur eine geringe Spannung zwischen den beiden Druckstufenblenden 41 und 18 erforderlich ist, um ebene Äquipotentialflächen in der oberen Druckstufenblendenöffnung 41 zu erhalten. Aufgrund der geringen Feldstärke zwischen den beiden Druckstufenblenden ist auch bei dieser Ausführungsform die Zentrierung der unteren Druckstufenblende 18 unproblematisch, so daß keine Vorrichtung hierfür erforderlich ist.

Wie in Fig. 6 und Fig. 7 ist auch für diese beiden Ausführungsformen vorgesehen, daß die obere Druckstufenblende 44 nahe unterhalb der Unterkante des Polschuhs 58 angeordnet ist, beispielsweise in der Höhe, in der auf der optischen Achse die maximale magnetische Flußdichte herrscht.

Fig. 7 zeigt ein anderes Ausführungsbeispiel für ein erfindungsgemäßes Druck-REM mit ausschließlich magnetischer Objektivlinse, die in diesem Fall lediglich aus der Einpollinse 64 besteht. Der Weg der Primärelektronen zur Probe, die Fokussierung der Primärelektronenstrahls durch die Einpollinse 64, die bevorzugte Größe der Öffnungen der Druckstufenblenden 18 und 44, und die bevorzugte Spannung zwischen der Probe 11 und der unteren Druckstufenblende 18 sind dieselben wie bei Fig. 6. Für die Spannung zwischen der Probe und der unteren Druckstufenblende ist allerdings zu beachten, daß Fig. 7 der Abwandlung von Fig. 6 entspricht, bei der die obere Druckstufenblende 44 auf einem positiven Potential gegenüber der unteren Druckstufenblende 18 liegt. Bei dem in Fig. 7 dargestellten Ausführungsbeispiel hat eine geringe Spannung von wenigen Volt zwischen der Probe und der unteren Druckstufenblende den Vorteil, daß die Sekundärelektronen nur eine geringe Geschwindigkeitskomponente senkrecht zur optischen Achse haben. Dies verbessert die Detektionseffienz bei der späteren Detektion. Außerdem haben die Sekundärelektronen mit einer Energie von nur wenigen Elektronenvolt auch einen sehr geringen Larmorradius, haben jedoch einen größeren mittleren Streuwinkel als bei höherer Energie. Ob der positive oder der negative Effekt überwiegt ist abhängig vom Abstand zwischen der Probe und der Druckstufenblende, vom Gasdruck, von der Primärenergie und vom Durchmesser der Druckstufenblendenöffnung 16.

Es könnten auch in Fig. 7 beide Druckstufenblenden auf dasselbe Potential gelegt werden. Dies hätte den Vorteil, daß sie besonders einfach als ein gemeinsamer Einsatz ausgeführt werden könnten, hätte jedoch den Nachteil einer verringerten Detektionseffizienz im Vergleich zum dargestellten Aufbau. Die bevorzugte Potentialdifferenz zwischen den beiden Druckstufenblenden 18 und 44 in Fig. 7 beträgt zwischen 5 V und 500 V. In Abhängigkeit von der Anregung der Einpollinse, dem Verlauf des magnetischen Feldes und der Spannung zwischen der Probe 11 und der unteren Druckstufenblende 18 gibt es für die Spannung zwischen den beiden Druckstufenblenden 18 und 44 einen Spannungsgrenzwert, ab dem keine Sekundärelektronen mehr durch die nach oben hin zunehmende magnetische Flußdichte zum Umkehren gezwungen werden, sondern nahezu alle Sekundärelektronen, die durch die untere Druckstufenblendenöffnung 16 gekommen sind, auch durch die obere Druckstufenblendenöffnung 41 gelangen. Neben diesem Spannungsgrenzwert ist aber auch die den Sekundärelektronen zugeführte Energie ein wichtiger Gesichtspunkt für die Wahl der Spannung zwischen den Druckstufenblenden. Die Spannung zwischen der unteren und der oberen Druckstufenblende wird so groß gewählt, daß die Energie der Sekundärelektronen oberhalb der oberen Druckstufenblende 44 mindestens so groß ist wie die Mindestenergie, die erforderlich ist, um den dort divergierenden magnetischen Feldlinien nicht zu folgen, sondern nach oben in Richtung zum Detektor zu fliegen. Durch die Gegenelektrode 78, die auf dem mittleren Potential der beiden Elektroden 75 und 81 liegt, können die Sekundärelektronen anschließend wieder abgebremst werden.

Der Detektor 51 mit seinem starken Saugfeld befindet sich hinter der Gitterelektrode 75. Die

Sekundärelektronen werden durch das elektrische Feld zwischen den Elektroden 81 und 75 und durch das Magnetfeld 80 zur Gitterelektrode 75 gelenkt. Für die Primärelektronen mit ihrer entgegengesetzten Flugrichtung, heben sich die Kraftwirkungen durch das Magnetfeld und das elektrische Feld hingegen auf und die beiden Felder bilden einen Wienfilter. Um auch bei einer Primärenergie von weniger als 4 keV bei einer verhältnismäßig starken Anregung dieses Wienfilters - beispielsweise zur Ablenkung von 20-eV-Sekundärelektronen - keinen chromatischen Fehler zu erzeugen, ist oberhalb des Wienfilters ein zweiter, demgegenüber um 180° gedrehter Wienfilter angeordnet, der die Wirkung des unteren Wienfilters für die Primärelektronen kompensiert. Dieser zusätzliche obere Filter muß nicht unmittelbar oberhalb des unteren Wienfilters angeordnet sein, sondern kann auch weiter oben in der Säule sein. Sein statisches Magnetfeld kann beispielsweise auch durch eine Rasterspule erzeugt werden.

Die im Vergleich zum Vakuumbetrieb stärkere Anregung des Wienfilters, der die Sekundärelektronen zum Detektor lenkt, ist vorteilhaft, wenn eine größere Spannung zwischen der Probe und der unteren Druckstufenblende angelegt wird, weil sie dann die Detektionseffizienz erhöht. Eine solche größere Spannung bis hin zu einer Spannung von mehreren hundert Volt kann je nach Betriebsbedingungen vorteilhaft sein. Insbesondere kann bei großem Abstand zwischen der Probe und der unteren Druckstufenblende durch eine Spannung von beispielsweise 100 V bis 500 V eine Sekundärelektronenkaskade erzeugt werden, die dazu führt, daß auch dann noch eine sehr gute Detektionseffizienz erhalten wird, wenn nur ein kleiner Anteil der Sekundärelektronen durch die untere Druckstufenblendenöffnung 16 hindurch gelangt. Hiermit ist der in Fig. 7 dargestellte Aufbau auch für große Arbeitsabstände geeignet. Entsprechendes gilt auch für das Ausführungsbeispiel aus Fig. 6 und für seine Abwandlung mit einer Spannung zwischen den beiden Druckstufenblenden.

Ein typischer Energiewert für das Maximum der Sekundärelektronen-Energieverteilung bei einer Spannung von 400 V zwischen der Probe und der unteren Druckstufenblende liegt beispielsweise bei 22 eV. Dementsprechend ist es vorteilhaft, wenn der Wienfilter entsprechend stark angeregt werden kann, um auch bei einer vorgeschlagenen Sekundärelektronenkaskade die bestmögliche Detektionseffizienz zu erreichen. Denn dann wird auch die Vorverstärkung mit Hilfe einer Sekundärelektronenkaskade, die dadurch erreichte gute Detektionseffizienz bei großem Arbeitsabstand und die Vergrößerung des Gesichtsfelds bei großem Arbeitsabstand sind nicht auf das Ausführungsbeispiel aus Fig. 7 beschränkt, sondern werden beim Betrieb mit einer Einpollinse auch in den anderen Ausführungsbeispielen erreicht.

Aufgrund der hohen Primärenergie erscheint die Feldkrümmung, die durch das Anlegen der Spannung zwischen der unteren Druckstufenblende und der Probe im Bereich der unteren Druckstufenblendenöffnung 16 erzeugt wird, unkritisch für die Auflösung. Wegen der verhältnismäßig hohen Energie der Sekundärelektronen und wegen der starken Anregung der Einpollinse erscheint sie auch

für die Detektionseffizienz unkritisch. Falls diese Feldkrümmung innerhalb der unteren Druckstufenblendenöffnung 16 aber doch unterdrückt werden soll, ist dies mit einer Hilfselektrode 13, wie sie in Fig. 4 und Fig. 6 dargestellt ist, leicht möglich. Indem die Hilfselektrode 13 auf ein positives Potential gegenüber der unteren Druckstufenblende 18 gelegt wird, kann die elektrische Feldstärke innerhalb der unteren Druckstufenblendenöffnung 16 so gering gemacht werden, daß sie nicht mehr stört. Der dabei entstehende Bereich mit niedriger elektrischer Feldstärke vor der Druckstufenblendenöffnung 16 verringert außerdem die mittlere Sekundärelektronenenergie, was positiv für die Detektion ist. Der Verstärkungsfaktor der Sekundärelektronenkaskade wird allerdings etwas abgeschwächt.

Nachdem die Sekundärelektronen in Fig. 7 durch die Gitterelektrode 75 gelenkt wurden, werden sie wie in Fig. 6 vom Saugfeld des Detektors 51 erfaßt, dessen bevorzugte Spannung zwischen 1 und 20 kV liegt.

Es ist von Vorteil, daß die Druckstufenblende 44 in Fig. 6 und Fig. 7 leicht auswechselbar ist, so daß sie leicht ersetzt werden kann. Außerdem ist es vorteilhaft, daß innerhalb der oberen Druckstufenblendenöffnung 41 eine hohe magnetische Flußdichte herrscht und die Öffnung 41 bevorzugt so groß ist, daß nicht nur alle Sekundärelektronen, sondern auch die meisten Rückstreuelektronen, die nicht durch die untere Druckstufenblende 18 abgeschattet werden, durch die Öffnung 41 hindurchgelangen. Eine andere bevorzugte Abwandlung der Ausführungsbeispiele aus Fig. 6 und Fig. 7, die einen besonders großen Durchmesser der unteren Druckstufenblendenöffnung 16 erlaubt, besteht darin, daß die obere Druckstufenblendenöffnung 41 gleichgroß oder kleiner ist als die untere Druckstufenblendenöffnung 16. Nahe unterhalb der oberen Druckstufenblende 44 ist (mit beispielsweise 100 µm, höchstens aber 1 mm Abstand) eine zusätzliche Blende angebracht, deren Öffnungsdurchmesser größer oder gleichgroß ist wie der Öffnungsdurchmesser der oberen Druckstufenblende 44. Der Zwischenraum zwischen den beiden Blenden ist mit einer regelbaren Gaszufuhr verbunden, durch die beispielsweise Ozon einströmt. Der Partialdruck des Ozons am Ort der Druckstufenblendenöffnung 41 unterscheidet sich vom dortigen Partialdruck des Wasserdampfes beim Betrieb mit maximal erlaubtem Gasdruck in der Probenkammer um einen Faktor von weniger als 100, bevorzugt um einen Faktor von weniger als 20. Falls es wünschenswert ist, kann die obere Druckstufenblende 44 bei diesem Ausführungsbeispiel gleichzeitig auch als Aperturblende verwendet werden.

Die Halterung 19 der oberen Druckstufenblende ist in Fig. 7 leicht demontierbar an der Elektrode 67 befestigt, über die die Druckstufenblende 44 auch kontaktiert ist. Die untere Druckstufenblende 18 ist leicht demontierbar am Polschuh 58 befestigt. Der Zwischenraum zwischen den beiden Druckstufenblenden wird mit Hilfe eines Wellschlauches 63 evakuiert, der beispielsweise leicht demontierbar in der Probenkammer angeflanscht sein kann. Der Wellschlauch 63 behindert die Probenkippbarkeit nur in eine Richtung, so daß die Probe in alle Richtungen gekippt werden

kann, wenn sie vorher entsprechend gedreht wird.

Eine vorteilhafte Abwandlung von Fig. 7 besteht darin, daß unterhalb der Probe eine weitere Einpollinse64 mit nach oben geöffnetem Polschuhspalt angeordnet ist, wie es aus Rastertransmissionselektronenmikroskopen oder Rasterelektronenmikroskopen mit,,In-Lens-Betrieb" bekannt ist. Der Vorteil besteht neben verringerten Fehlerkoeffizienten hauptsächlich in einer vergrößerten magnetischen Flußdichte am Ort der Probe. Hierdurch wird erreicht, daß auch bei gleichem Potential der beiden Druckstufenblenden 18 und 44 nur sehr wenig Sekundärelektronen durch die zunehmende magnetische Flußdichte zum Umkehren gezwungen werden. Eine bevorzugte Ausführungsform in Verbindung hiermit besteht deshalb darin, daß die beiden Druckstufenblenden wie in Fig. 6 Teil eines gemeinsamen Einsatzes 26sind. Eine andere bevorzugte Abwandlung des in Fig. 7 dargestellten Ausführungsbeispieles besteht darin, daß die Detektion unterhalb der Gegenelektrode 78 durch eine Bohrung im Polschuh 58 hindurch stattfindet, durch die hindurch das Saugfeld des Detektors 51 die Sekundärelektronen anzieht. Hierbei ist kein zusätzliches Magnetfeld 80 erforderlich.

In Fig. 1 werden nur diejenigen Sekundärelektronen detektiert, die beim Erreichen des Detektors 74 einen ausreichend großen Abstand von der optischen Achse 79 haben, um nicht durch die Öffnung 77 des Detektors zu fliegen. Die restlichen Sekundärelektronen fliegen durch die Öffnung 77 des Detektors. Um die Detektionseffizienz des Druck-REMs zu erhöhen, werden in dem Ausführungsbeispiel von Fig. 8 auch diese Sekundärelektronen 86 detektiert. Hierzu wird ein zusätzlicher oberer Detektor 91 verwendet, der nahe unterhalb der Aperturblende 94 angebracht ist. Die Elektrode 55 ist nach oben hin bis über die Aperturblende verlängert, und die Aperturblende 94 und der Detektor 91 liegen auf dem Potential der Elektrode 55. Aufgrund der kleinen Baugröße ist beispielsweise die Verwendung eines Halbleiterdetektors (mit nachgeschaltetem Optokoppler) als oberem Detektor 91 vorteilhaft.

Der untere Detektor 74 und die Aperturblende 94 werden gleichzeitig auch als Druckstufenblenden verwendet. Zwischen den Druckstufenblenden 44, 74 und 94 und oberhalb der Druckstufenblende 94 wird durch die Öffnungen 73, 76 und 98 abgepumpt, wie es die Pfeile andeuten. Für die Verwendung der Aperturblende 94 als Druckstufenblende ist ein elektromagnetischer Aperturblendenwechsler vorteilhaft, weil die Aperturblende dann nicht beweglich zusein braucht.

Fig. 9 zeigt eine andere Variante eines erfindungsgemäßen Druck-REMs mit zusätzlichem oberen Detektor 91, der hier als Kombination mit der Aperturblende 94ausgeführt ist. Eine bevorzugte Ausführungsform besteht in der Verwendung von Halbleitermaterial für das kombinierte Bauteil, wobei das Halbleitermaterial im Bereich um die optische Achse 79 herum bis auf eine geringe Dicke (< 100 μm) weggeätzt sein kann, so daß die Aperturblendenöffnungen nur eine geringe Länge haben. Von oben ist eine Metallbeschichtung aufgebracht, die als Aperturblende 94 wirkt und von unten ist das kombinierte Bauteil als Halbleiterdetektor 91ausgebildet. Für den mit der Aper-

turblende 94 kombinierten oberen Detektor 91 besteht eine bevorzugte Ausführungsform darin, daß oberhalb der Aperturblende 94 Ultrahochvakuum herrscht, damit die Aperturblende nicht beheizt zu werden braucht.

In Fig. 9 wird der von der Kathode 99 emittierte Primärelektronenstrahl mit Hilfe eines elektromagnetischen Aperturblendenwechslers durch die gewünschte Öffnung der Aperturblende 94 gefädelt. Unterhalb des Detektors 91 wird der Primärelektronenstrahl 82 durch die Magnetfelder 83 und 80 wieder auf die optische Achse gelenkt. Der anschließende Weg ist für die Primärelektronen und die Sekundärelektronen derselbe wie in Fig. 1. Bei dem in Fig. 9 dargestellten Aufbau werden auch die Sekundärelektronen 85 (und Rückstreuelektronen mit geringen Energieverlusten), die längs der optischen Achse durch die Öffnung 77 des unteren Detektors fliegen, durch die Magnetfelder 80 und 83 von der optischen Achse abgelenkt und zum oberen Detektor 91 geleitet.

Der in Fig. 8 und 9 dargestellte zusätzliche obere Detektor 91 kann mit den Ausführungsbeispielen aus Fig. 2 bis Fig. 5 kombiniert werden, sowie mit jedem Korpuskularstrahlgerät, bei dem der primäre Korpuskularstrahl nahe am Rand des Detektors 74 vorbeifliegt(beispielsweise durch eine Öffnung 77 des Detektors) und bei dem zwischen der Probe 11 und dem Detektor 74 ein elektrisches Feld vorhanden ist, das die Sekundärkorpuskeln in Richtung zum Detektor 74 beschleunigt. Die Detektion der Sekundärelektronen bzw. Sekundärkorpuskeln, die am Rand des unteren Detektors 74 vorbei geflogen sind (beispielsweise durch eine Öffnung 77 des Detektors), bewirkt sowohl beim Betrieb mit Gas in der Probenkammer als auch beim Vakuumbetrieb eine Erhöhung der Detektionseffizienz.

Beim Betrieb mit Vakuum in der Probenkammer ohne die Druckstufenblenden 18 und 44 bewirkt der zusätzliche obere Detektor 91 eine starke Verbesserung der Detektionseffizienz, wenn die Sekundärelektronen unter ungünstigen Betriebsbedingungen auf die Öffnung 77 des unteren Detektors fokussiert werden. Weiterhin macht sich die Verbesserung der Detektionseffizienz für die Bildmitte von Bildern mit niedriger Vergrößerung positiv bemerkbar. Bei der Aufnahme von Bildern mit dem unteren Detektor 74 fällt bei niedriger Vergrößerung nämlich ein dunkler Bereich in der Mitte des Bildes auf, der dadurch zustande kommt, daß bei den achsnahen Probenstellen mehr Sekundärelektronen durch die Öffnung 77 des unteren Detektors fliegen als bei den achsfernen Probenstellen. Dieser nachteilige Effekt entfällt, wenn man zum Signal des unteren Detektors 74 das Signal des oberen Detektors 91 hinzuaddiert, das von den Sekundärelektronen stammt, die durch die Öffnung 77 des unteren Detektors geflogen sind. Außerdem bringt der zusätzliche obere Detektor 91 im Vakuumbetrieb ein sehr wertvolles zusätzliches Signal. Es wird insbesondere durch diejenigen Sekundärelektronen erzeugt, die von der Probe unter kleinen Winkeln zur optischen Achse emittiert werden und deshalb vom unteren Detektor 74 nicht detektiert werden können, sondern durch seine Öffnung 77 fliegen. Sie sind für die Untersuchung tiefer Löcher und stark zerklüfteter Strukturen

erforderlich, für die der zusätzliche obere Detektor in idealer Weise geeignet ist. Da er von allen Probenstellen nur die Sekundärelektronen erfaßt, die unter kleinen Winkeln zur optischen Achse emittiert werden, erscheint der Boden eines tiefen Loches ähnlich hell wie erhabene Probenstellen. Um im Vakuumbetrieb Sekundärelektronen mit unterschiedlich großen Startwinkeln getrennt nachzuweisen, kann der Detektor 91 in mehrere teilchensensitive Bereiche aufgeteilt sein, die beispielsweise konzentrisch zur optischen Achse angeordnet sein können. Dieselben Vorteile erhält man auch bei der Verwendung des zusätzlichen oberen Detektors in einem Korpuskularstrahlgerät.

Für die Ausführungsbeispiele mit kombinierter elektrostatischer und magnetischer Objektivlinse, bei denen das Magnetfeld der Einpollinse 64 nicht in Betrieb ist und Die Sekundärelektronen deshalb elektrostatisch auf die obere Druckstufenblendenöffnung 41 fokussiert werden müssen, findet für große Abstände zwischen der Probe 11 und der Druckstufenblende 18 eine Verschlechterung der Auflösung und der Detektionseffizienz statt. Dieser Betriebszustand kann aber durch die Kombination mit anderen Detektoren, die für große Arbeitsabstände gut geeignet sind, weitgehend vermieden werden: Das elektrische Feld zwischen den Elektroden 18 und 44 (bzw. 18 und 39 in Fig. 3 und 5) bildet für erfindungsgemäße Druck-REMs ohne magnetische Einpollinse eine elektrostatische Linse, die bei großem Abstand zur Probe 11 eine Auflösungsverschlechterung bewirkt. Dies kann vermieden werden, indem die elektrostatische Linse beim Betrieb mit großem Arbeitsabstand ausgeschaltet und rein magnetisch fokussiert wird. Hierzu werden die Elektroden 18, 25, 44 (bzw. 39 und 43in Fig. 3 und 5), 50 und 55alle auf dasselbe Potential gelegt. Für den Betrieb mit Gas in der Probenkammer wird dann ein Kollektorelektroden-Detektor (WO 88/09564 A1, WO 90/04261 A1) oder ein Gasszintillationsdetektor und für den Betrieb mit Vakuum in der Probenkammer ein seitlich angeordneter Everhardt-Thornley-Detektor verwendet. Als Kollektorelektrode wird die Druckstufenblende 18 und/oder eine demgegenüber isolierte Kollektorelektrode 13, wie sie beispielsweise in Fig. 4 dargestellt ist, verwendet. Mit dem Kollektorelektroden-Detektor, für den bei dem großen Abstand zwischen der Probe 11 und der Druckstufenblende 18 günstige Betriebsbedingungen herrschen, wird dann immerhin dasselbe Signal-zu-Rausch-Verhältnis erreicht wie bei den heute bekannten Druck-REMs.

Das rein magnetische Fokussieren, bei dem die Elektrode 55 auf ein erdnahes Potential (< 1000 V)gelegt wird, ist für Primärenergien ≥ ca. 5 keV auch bei Verwendung einer Feldemissionskathode oder eines Schottky-Emitters ohne wesentliche Auflösungseinbußen möglich(weil die Extraktionselektrode nur bei Primärenergien < ca. 5 keV auf einem stark positivem Potential liegt). Beim Betrieb mit Gas in der Probenkammer macht sich diese Beschränkung auf hohe Primärenergien gar nicht bemerkbar, weil bei einem typischen Gasdruck von beispielsweise 10 hPa für größere Abstände zwischen der Probe 11 und der Druckstufenblende 18 sowieso nur Primärenergien > 5 keV in Frage kommen.

Eine vorteilhafte Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Druck-REMs, die bei großem Abstand zwischen der Probe 11 und der Druckstufenblende 18 eine starke Vergrößerung des Gesichtsfeldes bewirkt, besteht darin, daß statt der Ablenkspulen 59 ein Doppelablenkelement verwendet wird. Hiermit kann die Lage des Rasterzentrums auf der optischen Achse frei gewählt werden. Das größtmögliche Gesichtsfeld wird dabei erreicht, wenn um einen Punkt zwischen den beiden Druckstufenblenden 18 und 44 gerastert wird, dessen Lage auf der optischen Achse 79 so gewählt ist, daß das Gesichtsfeld sowohl von der unteren Druckstufenblende 18 als auch von der darüberliegenden Druckstufenblende 44 begrenzt wird.

Für Ausführungsformen der erfindungsgemäßen Druck-REMs, die bei hohem Druck in der Probenkammer(≥ 100 hPa) oder bei sehr geringen Primärenergien (< 1 keV bei beispielsweise 10 hPa Wasserdampf) arbeiten, entstehen Einschränkungen für den Arbeitsabstand und das Gesichtsfeld dadurch, daß hierfür kleine Abstände (< 300 μm) zwischen der Probe 11 und der Druckstufenblende 18 und ein kleiner Durchmesser (< 300 μm) der Öffnung 16 zwingend notwendig sind. Berührungen zwischen der Probe 11 und der Druckstufenblende 18 beim Bewegen des Probentisches können beim Betrieb mit Gas in der Probenkammer nach Vermessung der Probentopographie sicher vermieden werden.

Die Einschränkung des Gesichtsfeldes durch die Druckstufenblendenöffnung 16 kann durch die nachfolgend beschriebenen Ausgestaltungen der erfindungsgemäßen Druck-REMs kompensiert werden. Eine bevorzugte Ausgestaltung besteht in der Kombination mit einem computergesteuerten Probentisch und einer Bildverarbeitung, die es ermöglicht, mehrere elektronenmikroskopische Einzelbilder zu einem größeren Gesamtbild zusammenzusetzen. Eine weitere bevorzugte Ausgestaltung besteht in der Integration eines Auflichtmikroskopes oder eines konfokalen Lasermikroskopes in die Probenkammer. Hiermit wird vor der Untersuchung mit dem Elektronenstrahl von der bereits auf dem Probentisch montierten Probe ein Übersichtsbild aufgenommen und vom Computer gespeichert. In diesem Bild können mit Hilfe des Computers Stellen markiert werden, die dann von dem computergesteuerten Probentisch für die rasterelektronenmikroskopische Untersuchung angefahren werden. Solche lichtmikroskopischen Übersichtsbilder machen rasterelektronenmikroskopische Übersichtsbilder im Druck-REM für die meisten Anwendungen überflüssig.

Wenn mit dem Auflichtmikroskop oder dem konfokalen Lasermikroskop gleichzeitig auch noch die Probentopographie vermessen und vom Computer gespeichert wird, dann kann bei der nachfolgenden Untersuchung mit dem Elektronenstrahl auch der Arbeitsabstand vom Computer ohne zusätzliche Abstandskontrolle eingestellt werden und können beim Bewegen des Probentisches Berührungen zwischen der Probe 11 und der Druckstufenblende 18 sicher vermieden werden.

PATENTANSPRÜCHE

1. Rasterelektronenmikroskop mit einem Strahlerzeuger und einer Probenkammer, zwischen denen eine oder mehrere Druckstufenblenden angeordnet sind, durch deren Öffnungen ein Primärelektronenstrahl auf eine Probe in der Probenkammer lenkbar ist, wobei die der Probenächste, unterste Druckstufenblende (18), durch die der Primärelektronenstrahl auf die Probetrifft, dazu eingerichtet ist, einen erhöhten Druck in der Probenkammer gegenüber der übrigen Mikroskopsäule des Rasterelektronenmikroskops abzuschirmen und durch ihre Öffnung (16) Sekundärelektronen von der Probe zu mindestens einem Detektor durchzulassen,

dadurch gekennzeichnet, daß

als Detektor ein hochempfindlicher, gegenüber der Probe positiv vorgespannter Detektor (51, 74, 91) vorgesehen ist.

- 2. Rasterelektronenmikroskop gemäß Anspruch 1, bei dem oberhalb der untersten Druckstufenblende (18) mindestens eine Elektrode (39, 43, 44, 55) angeordnet ist, die gegenüber der Druckstufenblende (18) auf positivem Potential liegt und dazu eingerichtet ist, die Sekundärelektronen von der Probe hin zum Detektor (51, 74, 91) zu lenken.
- 3. Rasterelektronenmikroskop mit einem Strahlerzeuger und einer Probenkammer, zwischen denen eine oder mehrere Druckstufenblenden angeordnet sind, durch deren Öffnungen ein Primärelektronenstrahl auf eine Probe in der Probenkammer lenkbar ist, von denen die unterste Druckstufenblende (18) dazu eingerichtet ist, einen erhöhten Druck in der Probenkammer gegenüber der übrigen Mikroskopsäule des Rasterelektronenmikroskops abzuschirmen, insbesondere Rasterelektronenmikroskop nach Anspruch 2,

dadurch gekennzeichnet, daß

das Rasterelektronenmikroskop zur Detektion der Sekundärelektronen durch die Öffnung mindestens einer Druckstufenblende eingerichtet ist, die schichtweise aus mindestens zwei leitfähigen, voneinander elektrisch isolierten Schichten (39, 43) aufgebaut ist, wobei die leitfähigen Schichten derart mit Potentialen beaufschlagbar sind, daß die Unter- und Oberseite der jeweiligen Druckstufenblende eine Potentialdifferenz besitzen.

4. Rasterelektronenmikroskop gemäß Anspruch 2 oder 3, bei dem die Druckstufenblende (18) und/oder die darüberliegenden Elektroden (39, 43, 44, 50, 55) eine oder mehrere elektrosta-

tische Linsen bilden, die zur Fokussierung des Primärelektronenstrahls im elektrischen Feld zwischen der Druckstufenblende (18) und der darüberliegenden Elektrode (44 bzw. 39) bzw. zwischen den darüberliegenden Elektroden (43, 44, 50, 55) eingerichtet sind.

- 5. Rasterelektronenmikroskop gemäß Anspruch 2 oder 3, bei dem die Elektroden (39, 43, 44, 50, 55) konzentrisch zur optischen Achse des Rasterelektronenmikroskops angeordnet sind.
- 6. Rasterelektronenmikroskop gemäß einem der Ansprüche 2 bis 5, bei dem die Oberfläche des Detektors (51, 75, 91) zumindest in Teilbereichen auf einem Potential liegt, das gegenüber dem Potential der Probe um mehr als 500 V positiv ist.
- 7. Rasterelektronenmikroskop gemäß einem der Ansprüche 2 bis 5, bei dem die Oberfläche des Detektors (51, 75, 91) zumindest in Teilbereichen auf einem Potential liegt, das gegenüber dem Potential der Probe um mehr als 1000 V positiv ist.
- 8. Rasterelektronenmikroskop gemäß einem der Ansprüche 2 bis 7, bei dem eine kombinierte elektrostatische und magnetische Objektivlinse vorgesehen ist.
- 9. Rasterelektronenmikroskop gemäß einem der Ansprüche 2 bis 8, bei dem eine oder mehrere Elektroden (39, 44) oberhalb der Druckstufenblende (18) weitere Druckstufenblenden bilden, wobei Pumpeinrichtungen zur Erzeugung von Unterdrücken in den Zwischenräumen zwischen den Druckstufenblenden vorgesehen sind.
- 10. Rasterelektronenmikroskop gemäß Anspruch 9, bei dem die als Druckstufenblenden gestalteten Elektroden Öffnungen besitzen, die eine charakteristische Dimension von weniger als 1500 µm besitzen.
- 11. Rasterelektronenmikroskop gemäß einem der Ansprüche 2 bis 10, bei dem ein Komponentenaufbau vorgesehen ist, wobei die zum Mikroskopbetrieb bei erhöhtem Druck in der Probenkammer erforderlichen Bauteile (13, 18, 19, 31, 32, 39, 40, 42-44, 60, 63, 65, 68, 69) eine oder mehrere leicht demontierbare Baugruppen in der Probenkammer bilden.
- 12. Rasterelektronenmikroskop gemäß Anspruch 2, bei dem ein erster Detektor (74) mit seinem äußeren Rand oder einer inneren Öffnung (77) an den Primärelektronenstrahl angrenzend angeordnet und ein zweiter Detektor (91) vorgesehen ist, der in Bezug auf die Bewegungsrich-

tung der Sekundärelektronen hinter dem Rand bzw. der Öffnung des ersten Detektors (74) positioniert und zur Detektion von Sekundärelektronen (85, 86) eingerichtet ist, die sich am Rand vorbei- oder durch eine Öffnung (77) hindurchbewegen.

- 13. Rasterelektronenmikroskop gemäß einem der Ansprüche 2 bis 12, bei dem die Sekundärelektronen mit Hilfe eines Magnetfeldes (80) von der optischen Achse abgelenkt werden.
- 14. Rasterelektronenmikroskop gemäß Anspruch 1, bei dem die Oberfläche des Detektors (51, 75, 91) zumindest in Teilbereichen auf einem Potential liegt, das gegenüber dem Potential der Probe um mehr als 500 V positiv ist.
- 15. Rasterelektronenmikroskop gemäß Anspruch 1, bei dem die Oberfläche des Detektors (51, 75, 91) zumindest in Teilbereichen auf einem Potential liegt, das gegenüber dem Potential der Probe um mehr als 1000 V positiv ist.
- 16. Rasterelektronenmikroskop gemäß Anspruch 1 oder 15, bei dem ein Komponentenaufbau vorgesehen ist, wobei nur zum Mikroskopbetrieb bei erhöhtem Druck in der Probenkammer erforderliche Bauteile (13, 18, 19, 26, 31, 32, 39, 40, 42-44, 60, 63, 65, 68, 69) eine oder mehrere leicht demontierbare Baugruppen in der Probenkammer bilden.
- 17. Rasterelektronenmikroskop gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem ein Magnetfeld zwischen der Probe (11) und der untersten Druckstufenblende (18) vorhanden ist, das bezüglich der optischen Achse rotationssymmetrisch ist und das den Transport der Sekundärelektronen von der Probe zur Druckstufenblendenöffnung (16) verbessert.
- 18. Rasterelektronenmikroskop gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die Sekundärelektronen auf ihrem Weg zum Detektor (51, 74, 91) durch mindestens zwei Druckstufenblendenöffnungen (16, 41) gehen, in denen ein Magnetfeld derart vorhanden ist, daß sämtliche Magnetfeldlinien, die durch die untere Druckstufenblendenöffnung (18) verlaufen, auch durch die obere Druckstufenblendenöffnung (44) verlaufen.
- 19. Rasterelektronenmikroskop gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem neben dem Magnetfeld der Objektivlinse (62, 64) ein zusätzliches Magnetfeld (80) eingerichtet ist, das die Sekundärelektronen in Richtung zum Detektor (51) lenkt.

20. Rasterelektronenmikroskop gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem eine Gegenelektrode (78) dazu eingerichtet ist, die Sekundärelektronen abzubremsen und dadurch den Transport der Sekundärelektronen zum Detektor (51) zu unterstützen.

- 21. Rasterelektronenmikroskop gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem ein Detektor für energiedispersive Röntgenspektroskopie (EDX) zum Betrieb bei Abständen von weniger als 1,5 mm zwischen der Probe (11) und der untersten Druckstufenblende (18) vorgesehen ist.
- 22. Verwendung eines Rasterelektronenmikroskops gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche zur Aufnahme rasterelektronenmikroskopischer Abbildungen von Proben in einer Probenkammer unter erhöhtem Druck.

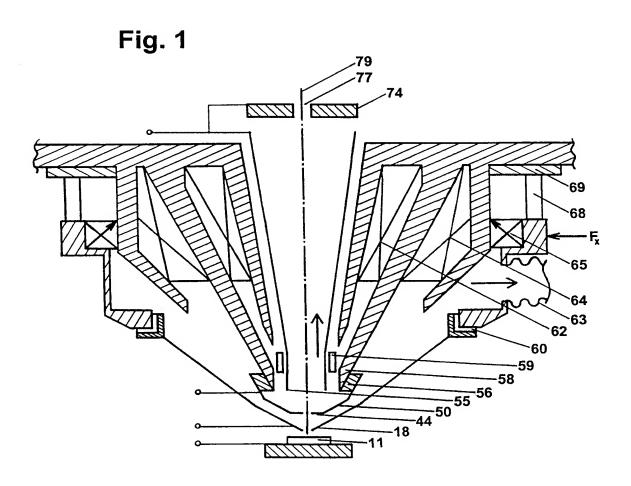


Fig. 2

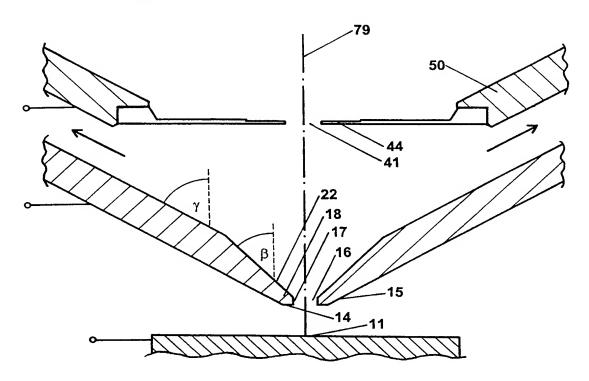
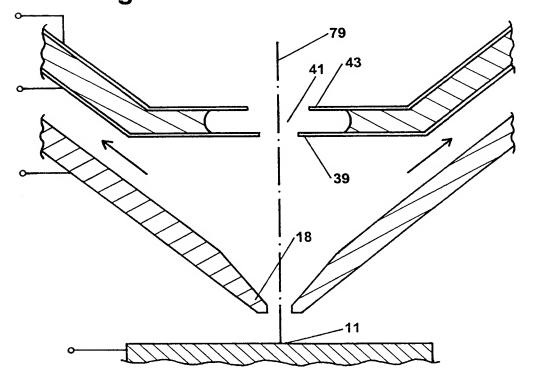
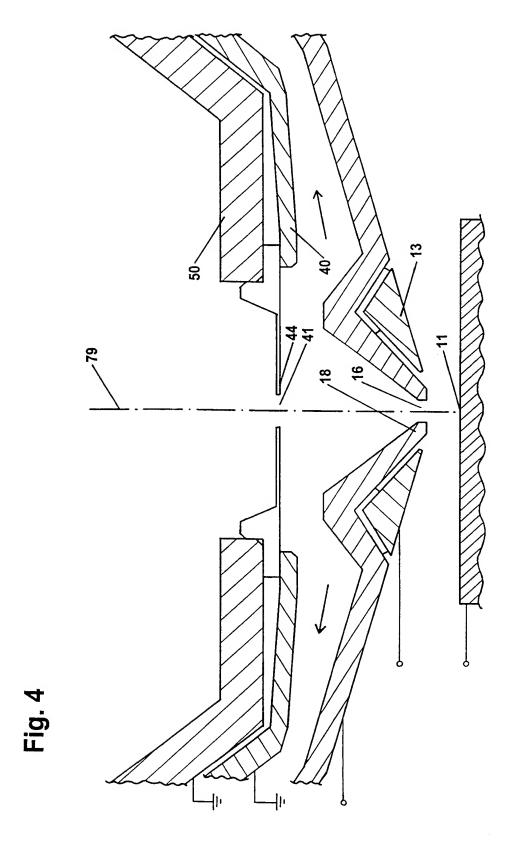


Fig. 3





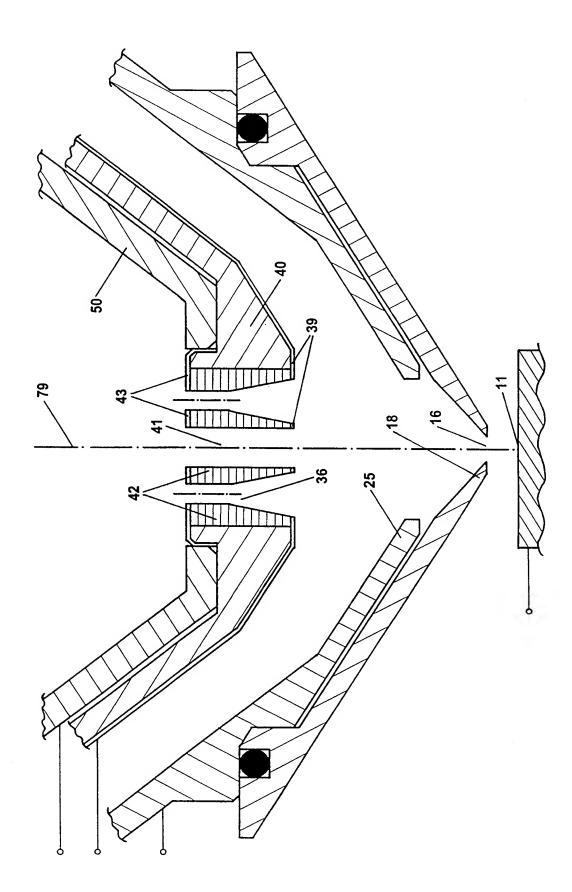
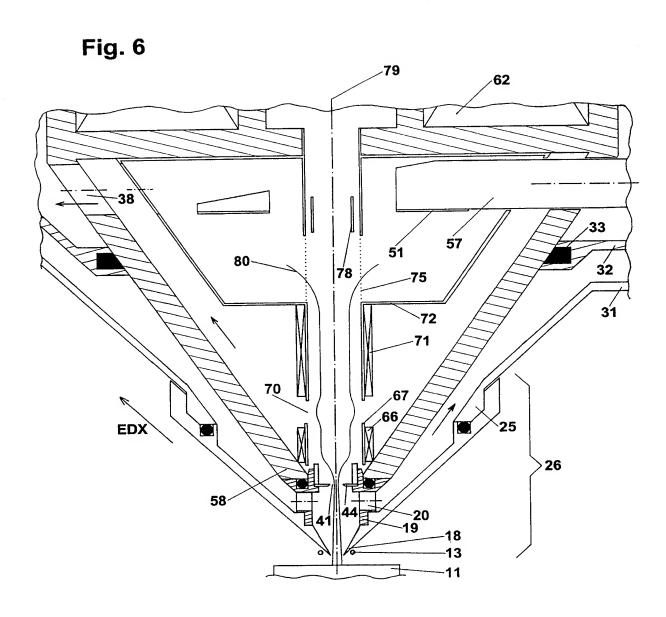
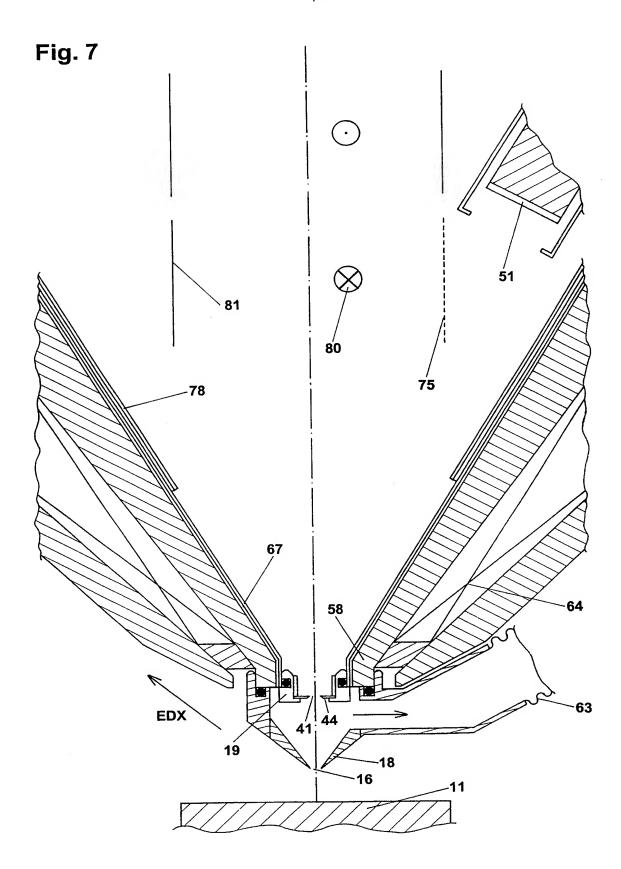
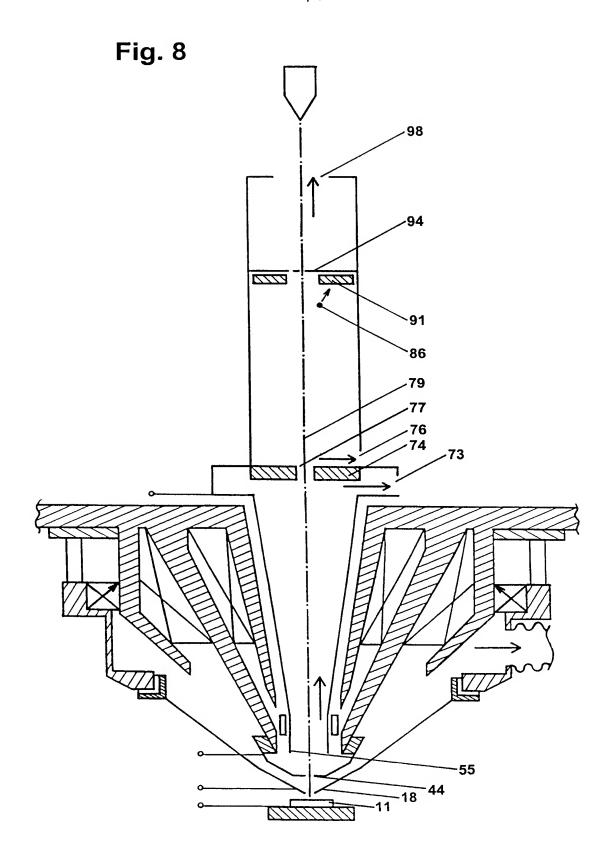
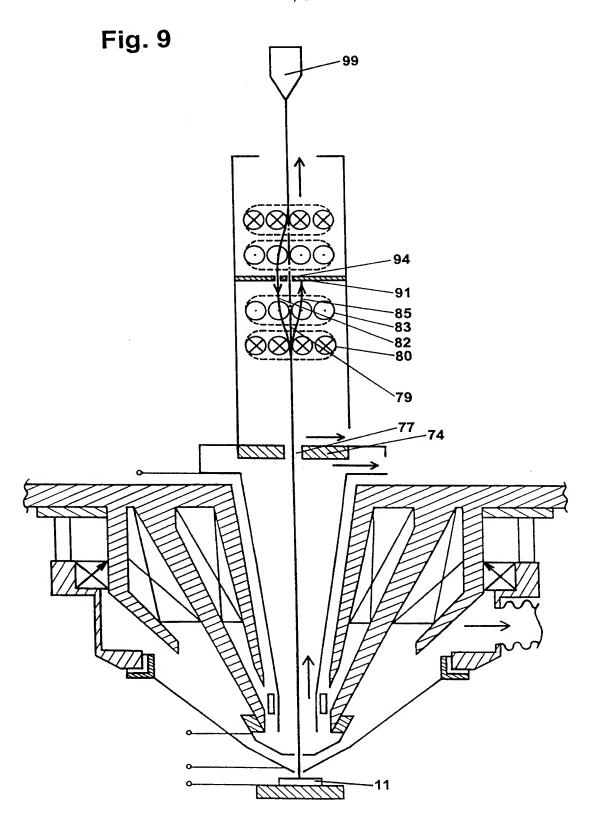


Fig. 5









INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inter onal Application No PCT/EP 99/01544

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 6 H01J37/28 H01J37/244

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) $IPC\ 6\ H01J$

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

Category °	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
Calegory	Chanton of document, war indication, who appropriately			
Α	WO 97 07526 A (PHILIPS ELECTRONICS NA) 27 February 1997 (1997-02-27) page 21, line 20 - page 22, line 33; figures	1,2,5		
Α	US 5 362 964 A (KNOWLES W RALPH ET AL) 8 November 1994 (1994-11-08) column 7, line 10 - column 10, line 20; figures 6-8	1,2,5		
А	US 5 677 531 A (MIYAZAKI YASUMICHI) 14 October 1997 (1997-10-14) column 3, line 1 - column 4, line 46; figures 1-3	1		

X Further documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed in annex.
 Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filling date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filling date but later than the priority date claimed 	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. "&" document member of the same patent family
Date of the actual completion of the international search	Date of mailing of the international search report
26 July 1999	03/08/1999
Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer Schaub, G

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inter anal Application No
PCT/EP 99/01544

	tion) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	Deloyant to claim No
Category ²	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	EP 0 817 235 A (HITACHI LTD) 7 January 1998 (1998-01-07) cited in the application abstract; figures	1
		Y)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inter onal Application No PCT/EP 99/01544

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)		Publication date
WO 9707526	Α	27-02-1997	EP	0788653 A	13-08-1997
US 5362964	A	08-11-1994	EP EP JP WO US	0753200 A 0924743 A 9501010 T 9504367 A 5412211 A	15-01-1997 23-06-1999 28-01-1997 09-02-1995 02-05-1995
US 5677531	Α	14-10-1997	JP JP	9050780 A 9199070 A	18-02-1997 31-07-1997
EP 0817235	Α	07-01-1998	JP DE DE EP US	6132002 A 69317847 D 69317847 T 0592899 A 5387793 A	13-05-1994 14-05-1998 03-12-1998 20-04-1994 07-02-1995

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inter phales Aktenzeichen PCT/EP 99/01544

a. klassifizierung des anmeldungsgegenstandes IPK 6 H01J37/28 H01J37/244 Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK B. RECHERCHIERTE GEBIETE Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 6 H01J Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr. Kategorie® WO 97 07526 A (PHILIPS ELECTRONICS NA) 1,2,5 27. Februar 1997 (1997-02-27) Seite 21, Zeile 20 - Seite 22, Zeile 33; Abbildungen US 5 362 964 A (KNOWLES W RALPH ET AL) 1,2,5 Α 8. November 1994 (1994-11-08) Spalte 7, Zeile 10 - Spalte 10, Zeile 20; Abbildungen 6-8 US 5 677 531 A (MIYAZAKI YASUMICHI) 1 Α 14. Oktober 1997 (1997-10-14) Spalte 3, Zeile 1 - Spalte 4, Zeile 46; Abbildungen 1-3 Siehe Anhang Patentfamilie Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erkann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist Absendedatum des internationalen Recherchenberichts Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 03/08/1999 26. Juli 1999 Bevollmächtigter Bediensteter Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Schaub, G Fax: (+31-70) 340-3016

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inter phales Aktenzeichen
PCT/EP 99/01544

	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Kategorie*	Bezeichnung der Veromentlichung, soweit erlordenlich unter Angabe der in Betracht könnthenden Telle	South Autopration 141.
Α	EP 0 817 235 A (HITACHI LTD) 7. Januar 1998 (1998-01-07) in der Anmeldung erwähnt Zusammenfassung; Abbildungen	1
	*	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inter nales Aktenzeichen
PCT/EP 99/01544

	cherchenberich tes Patentdokun		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung	
WO	9707526	Α	27-02-1997	EP	0788653 A	13-08-1997	
US !	5362964	Α	08-11-1994	EP EP JP WO US	0753200 A 0924743 A 9501010 T 9504367 A 5412211 A	15-01-1997 23-06-1999 28-01-1997 09-02-1995 02-05-1995	
US	5677531	Α	14-10-1997	JP JP	9050780 A 9199070 A	18-02-1997 31-07-1997	
EP	0817235	Α	07-01-1998	JP DE DE EP US	6132002 A 69317847 D 69317847 T 0592899 A 5387793 A	13-05-1994 14-05-1998 03-12-1998 20-04-1994 07-02-1995	